This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

· US EΡ PCT

国際調査報告

(法8条、法施行規則第40、41条) [PCT18条、PCT規則43、44]

出願人又は代理人 の書類記号 WA-0602	今後の手続きについては、国際調査報告の送付通知様式(PCT/ISA/220) 及び下記5を参照すること。		
国際出願番号 PCT/JP01/01562	国際出願日 (日.月.年) 01.03.01 優先日 (日.月.年) 02.03.00		
出願人(氏名又は名称) 日本碍子株式会社			
国際調査機関が作成したこの国際調査 この写しは国際事務局にも送付される	資報告を法施行規則第41条(PCT18条)の規定に従い出願人に送付する。 る。		
この国際調査報告は、全部で5	ページである。		
この調査報告に引用された先行	支術文献の写しも添付されている。		
1. 国際調査報告の基礎 a. 言語は、下記に示す場合を除 この国際調査機関に提出さ	くほか、この国際出願がされたものに基づき国際調査を行った。 れた国際出願の翻訳文に基づき国際調査を行った。		
b. この国際出願は、ヌクレオチ この国際出願に含まれる書	ド又はアミノ酸配列を含んでおり、次の配列表に基づき国際調査を行った。 F面による配列表		
□ この国際出願と共に提出さ	れたフレキシブルディスクによる配列表		
出願後に、この国際調査機	関に提出された書面による配列表		
	関に提出されたフレキシブルディスクによる配列表		
□ 出願後に提出した書面によ 書の提出があった。	: る配列表が出願時における国際出願の開示の範囲を超える事項を含まない旨の陳述		
1	た配列とフレキシブルディスクによる配列表に記録した配列が同一である旨の陳述		
2. 請求の範囲の一部の調査	ができない(第1欄参照)。		
3. X 発明の単一性が欠如している(第II 欄参照)。			
4. 発明の名称は 🛛 🗓 出	願人が提出したものを承認する。		
□ 次	に示すように国際調査機関が作成した。		
-			
	願人が提出したものを承認する。		
▼ 第Ⅲ欄に示されているように、法施行規則第47条 (PCT規則38.2(b))の規定により 国際調査機関が作成した。出願人は、この国際調査報告の発送の日から1カ月以内にこの国際調査機関に意見を提出することができる。			
- 6. 要約售とともに公表される図は 第 <u>1</u> 図とする。区 出	、 願人が示したとおりである。		
	願人は図を示さなかった。		
□ 本	図は発明の特徴を一層よく表している。		

		- 4	
_	-to dru		
[Ŧ:]	際調	合文	## *

第1欄 請求の範囲の一部の調査ができた	はいときの怠見(第1ペーシの2の続き)
法第8条第3項 (PCT17条(2)(a)) の成しなかった。	規定により、この国際調査報告は次の理由により請求の範囲の一部について作
1. □ 請求の範囲 つまり、	は、この国際調査機関が調査をすることを要しない対象に係るものである。
2. 計求の範囲 ない国際出願の部分に係るもので	は、有意義な国際調査をすることができる程度まで所定の要件を満たしてい である。つまり、
3.	は、従属請求の範囲であってPCT規則6.4(a)の第2文及び第3文の規定に
第Ⅱ欄 発明の単一性が欠如しているとき	の意見(第1ページの3の続き)
	この発明があるとこの国際調査機関は認めた。
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
き、その後もゼオライト膜を破壊する ゼオライト成形体、ゼオライト積層体 載の発明は、クラックを発生させ ス分離膜や、浸透気化膜として用 ものである。請求の範囲16-2 の減少及び機械的強度の維持向上	て解決しようとする課題が同一とは言えず、請求の範囲1−24は
1. X 出願人が必要な追加調査手数料での範囲について作成した。	とすべて期間内に納付したので、この国際調査報告は、すべての調査可能な請求
2. 追加調査手数料を要求するまで 加調査手数料の納付を求めなか。	もなく、すべての調査可能な請求の範囲について調査することができたので、追った。
3. 出願人が必要な追加調査手数料を付のあった次の請求の範囲のみに	を一部のみしか期間内に納付しなかったので、この国際調査報告は、手数料の納 こついて作成した。
4. 団 出願人が必要な追加調査手数料 されている発明に係る次の請求の	を期間内に納付しなかったので、この国際調査報告は、請求の範囲の最初に記載 の範囲について作成した。
追加調査手数料の異議の申立てに関する ・ 追加調査手数料の納付と共に	生意 出願人から異議申立てがあった。
1 =	出願人から異議申立てがなかった。

第Ⅲ欄 要約 (第1ページの5の続き)

ゼオライトからなる多孔質のゼオライト成形体であって、原料段階でのテトラプロピルアンモニウムイオン(TPA)とシリカゾルとの配合割合(TPA/SiO₂)がモル比で0.015~0.08であり、かつ完全に結晶化したゼオライトからなるゼオライト成形体。又は、原料段階でのTPA/SiO₂がモル比で0.02~0.12であり、かつ結晶化途上のゼオライトからなるゼオライト成形体。

平均粒子径が1.0μm以上、曲げ強度が1.5MPa以上、かつ、その肉厚を1.8mmとしたときの、ヘリウムガスの透過量10ml/cm²·minにおける供給側圧力と透過側圧力との差が、1.0気圧以下であるゼオライト成形体。

成形体の破断面の微構造観察において、ゼオライト成形体を構成する粒子のうち、粒界破壊することにより個々の粒子が明瞭に観察される部分の面積が、全破断面積の70%以上であるゼオライト成形体。

及び、上記成形体上に、更に、同一、又は類似のゼオライト膜を積層したゼオライト積層体。

A. 発明の原	属する分野の分類(国際特許分類(IPC))		
Int. Cl.	C01B39/04		
B. 調査を行ったよ	fった分野 B小限資料(国際特許分類(IPC))		
	C01B39/00-39/54, B01J29/00		
Int. C1.	CO1833/ 00 33/ 34, BO1323/ 00		
最小限資料以外	トの資料で調査を行った分野に含まれるもの	141	
日本国実用	新案公報 1926-1996年 実用新案公報 1971-2001年		
日本国登録	実用新案公報 1994-2001年		
日本国実用	新案登録公報 1996-2001年	· .	
国際調査で使用	用した電子データベース (データベースの名称、	調査に使用した用語)	-
	• •		
•	· .		
	ると認められる文献		関連する
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連すると	きは、その関連する箇所の表示	請求の範囲の番号
PX	WO,00/23378,A1 (日本碍子株式会社)	27.4月.2000 (27.04.00),全	16-18
PA	文参照 & AU, 6006299, B		1-15, 19-24
Х	EP, 152485, A1 (TOA NENRYO KOGYO KA)	BUSHIKI KAISHA)28.8月.1985	16
-A	(28.08.85),全文参照 & JP,59-16295		1-15, 17-24
PX '	JP, 2000-327327, A (株式会社クボタ)28 11月 2000(28 11 0	16
PA	0) , 全文参照 (ファミリーなし)		1-15, 17-24
		9	
X C欄の続	きにも文献が列挙されている。	□ パテントファミリーに関する別	川紙を参照。
* 引用文献	のカテゴリー	の日の後に公表された文献	
「A」特に関	連のある文献ではなく、一般的技術水準を示す	「T」国際出願日又は優先日後に公表 出願と矛盾するものではなく、	された文献であって 発明の原理又は理論
「F」、国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日 の理解のために引用するもの			
以後に公表されたもの 「X」特に関連のある文献であって、当 「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行 の新規性又は進歩性がないと考え			当該文献のみで発明 えられるもの
日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する 「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1			当該文献と他の1以
「O」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献 よって進歩性がないと考えられるもの			
「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願 「&」同一パテントファミリー文献			
国際調査を完	了した日 22.05.01	国際調査報告の発送日 05.06	.01
国際調本機関		特許庁審査官(権限のある職員)	4G 9830
	国特許庁 (ISA/JP)		
市市	郵便番号100-8915 熱手代田区電が関三丁目4番3号	電話番号 03-3581-1101	内線 3416

 C(続き).	関連すると認められる文献	
引用文献の		関連する 請求の範囲の番号
カテゴリー* X A	JP, 6-183727, A (東ソー株式会社) 5.7月.1994 (05.07.94), 全文 参照 (ファミリーなし)	16 1-15, 17-24
X A	JP,61-72621, A (東亜燃料工業株式会社) 14.4月.1986 (14.04.8 6),全文参照(ファミリーなし)	16 1-15, 17-24
X A	EP,778076, A1(Institut Francais du Petrole)11.6月.1997(11.0 6.97), 請求項1,請求項3参照 & JP,09-173799,A,請求項1,請求項3参照 & US,6140263,A,請求項1,請求項3参照	16 1-15, 17-24
A	JP, 5-146684, A (株式会社日鉱共石) 15.6月.1993 (15.06.93), 全文参照 (ファミリーなし)	1-24
11 1		

	原本(田観用)- 印刷日	3時 2001年03月01日 (01.03.2001) 木曜日 10時27分41秒
0	受理官庁記入欄	
0-1	国際出願番号.	PCT
0-2	国際出願日	01.3.01
0-3	(受付印)	受領印
0-4	様式-PCT/RO/101 この特許協力条約に基づく 国際出願願書は、	
0-4-1	右記によって作成された。	PCT-EASY Version 2.91 (updated 01.01.2001)
0-5	申立て 出願人は、この国際出願が特許 協力条約に従って処理されることを請求する。	
0-6	出願人によって指定された 受理官庁	日本国特許庁 (RO/JP)
0-7	出願人又は代理人の書類記号	WA-0602
I	発明の名称・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	ゼオライト成形体、ゼオライト積層中間体、ゼオライト積層複合体及びそれらの製造方法
II	出願人	
II-1	この欄に記載した者は	出願人である(applicant only)
II-2	右の指定国についての出願人である。	米国を除くすべての指定国 (all designated States except US)
II-4ja	名称	日本碍子株式会社
II-4en	Name	NGK INSULATORS, LTD.
II-5ja	あて名:	467-8530 日本国
II-5en	Address:	愛知県 名古屋市 瑞穂区須田町2番56号 2-56, Suda-cho, Mizuho-ku Nagoya- city , Aichi 467-8530
II-6	国際 (国友)	Japan ^{shi}
II-6	国籍(国名)	日本国 JP
i	住所 (国名)	日本国 JP
II-8	電話番号	052-872-7726
11-9	ファクシミリ番号	052-872-7936

特許協力条約に基づく国際出願願書 原本(出願用) - 印刷日時 2001年03月01日 (01.03.2001) 木曜日 10時27分41秒

III-1-1 この欄に記載した者は 出頭人及び発明者である (applicant and inventor) 大名 (姓名) 大名 (姓名) 大名 (姓名) 大名 (世名) 大名 (世子) 大名 (世名)	III-1	その他の出願人又は発明者			
III-1-4	III-1-1		出版 及び終明者でも Z (
Till-1-2 おの指定国についての出願人で 大名(姓名) 大名(姓名) 大名(姓名) TOMI TA, Toshihiro 467-8530 日本国 要如果 名古屋市 現施区須田町2番56号 日本母子株式会社内。			山限人及び完明名である (applicant and		
Mana	III-1-2	右の指定国についての出願人で			
III-1-da		ある。	木国のみ (US only)		
III-1-4em Name (LAST, First)	III-1-4ja		宣用 俊弘		
III-1-6 n Address: 467-8530 日本国	III-1-4en				
Wang					
III-1-5en Address:					
日本陽子株式会社内					
III-1-5m Address:					
III-1-6	III-1-5en	Address:			
Nagoya-city, Aichi 467-8530 Japan 日本国 JP 日本日 JP 日本日 JP 日本国 東京都 台東区 浅草橋3丁目20番18号 第8菊星タワービル3階 3rd F1 No. 8 Kikuboshi Tower Building, 20-18, Asakusabashi 3-chome Taito-ku, Tokyo 111-0053 Japan 03-5820-0535					
III-1-6 国籍(国名)			Nagova ncitu Aichi 467-9520		
III-1-6 国籍 (国名)			llanan shi		
III-2- 住所 (国名) 日本国 JP	III-1-6	 国籍 (国名)			
III-2- この他の出願人又は発明者	III-1-7		1		
III-2-1 この欄に記載した者は 出願人及び発明者である (applicant and inventor) 大国のおの指定国についての出願人で	III-2				
III-2-2 右の指定国についての出願人である。 III-2-4 III-2-4 III-2-5 Ack (姓名) 大名:	III-2-1		 出願 ガパ祭明老である (appliaget and		
III-2-4		C - M C HO TO TO TO TO			
III-2-4 s 50 50 50 50 50 50 50	III-2-2	右の指定国についての出願意で			
Name (LAST, First)		ある。	The Manager of the Control of th		
Name (LAST, First)			中村 真二 ***********************************		
III-2-5ja あて名: 467-8530 日本国 受知県 名古屋市 瑞穂区須田町2番56号 日本碍子株式会社内 c/o NGK INSULATORS, LTD. 2-56, Suda-cho, Mizuho-ku, Nagoya city, Aichi 467-8530 Japan shi	III-2-4en	Name (LAST, First)			
Wind part of the first of t	III-2-5ja	あて名:			
III-2-5en Address:					
日本碍子株式会社内					
Color NGK INSULATORS, LTD. 2-56, Suda-cho, Mizuho-ku, Nagoya-city, Aichi 467-8530 Japan			日本碍子株式会社内		
2-56, Suda-cho, Mizuho-ku, Nagoya-city, Japan shi 日本国 JP 日本国 東京都 台東区 JP 日本国	III-2-5en	Address:			
Nagoya city Japan shi					
III-2-6 国籍 (国名)			Nagoya -city, Aichi 467-8530		
III-2-7 住所 (国名) 日本国 JP 日本国 JP			Japan ^{shi}		
代理人又は共通の代表者、 通知のあて名 下記の者は国際機関において右 記のごとく出願人のために行動 する。 IV-1-1ja KA (姓名) (大名 (姓名) (大名 (姓名) (大名 (姓名) (大名 (杜名) (大名 (大名 (杜名) (大名 (大名 (杜名) (大名 (杜A) (大名 (杜名) (大名 (杜A) (大A) (大名 (杜A) (大A) (大A) (大A) (大A) (大A) (大A) (大A) (大			日本国 JP		
通知のあて名 下記の者は国際機関において右記のごとく出願人のために行動する。 IV-1-1ja IV-1-1en Name (LAST, First) IV-1-2ja			日本国 JP		
下記の者は国際機関において右記のごとく出願人のために行動する。 氏名(姓名) 渡邉 一平 WATANABE, Kazuhira 111-0053 日本国東京都 台東区 浅草橋3丁目20番18号 第8菊星タワービル3階 3rd Fl. No.8 Kikuboshi Tower Building, 20-18, Asakusabashi 3-chome Taito-ku, Tokyo 111-0053 Japan 03-5820-0535 1V-1-3 電話番号 代理人 (agent) 代理人 (agent) で記述されています。 代理人 (agent) で記述されています。 で記述されていまする。 で記述されています。 で記述されていまするいます。 で記述されていまする。 で記述されていまする。 で記述されていまする。 で記述されていまする。 で記述されていまする。 で記述され	IV-1	代理人又は共通の代表者、			
記のことく出願人のために行動する。 IV-1-1ja		連知のあて名	215 TOTAL 1		
する。 氏名(姓名) 渡邉 一平 WATANABE, Kazuhira 111-0053 日本国東京都 台東区 浅草橋3丁目20番18号 第8菊星タワービル3階 3rd Fl. No.8 Kikuboshi Tower Building, 20-18, Asakusabashi 3-chome Taito-ku, Tokyo 111-0053 Japan 03-5820-0535 1V-1-3 電話番号		F記の有は国際機関において石 記のデレく出願しのために行動	代埋人(agent)		
K名(姓名) 1V-1-1en K名(姓名) 1V-1-2ja K名(姓名) Name (LAST, First) WATANABE, Kazuhira 111-0053 日本国東京都 台東区 浅草橋3丁目20番18号 第8菊星タワービル3階 3rd Fl. No.8 Kikuboshi Tower Building, 20-18, Asakusabashi 3-chome Taito-ku, Tokyo 111-0053 Japan 03-5820-0535					
IV-1-1en IV-1-2jaName (LAST, First)WATANABE, KazuhiraIV-1-2jaあて名:111-0053 日本国東京都 台東区 浅草橋3丁目20番18号 第8菊星タワービル3階IV-1-2enAddress:3rd Fl. No. 8 Kikuboshi Tower Building, 20-18, Asakusabashi 3-chome Taito-ku, Tokyo 111-0053 Japan 03-5820-0535	IV-1-1ja	氏名(姓名)	渡邉 一平		
IV-1-2ja あて名: 111-0053 日本国東京都 台東区 浅草橋3丁目20番18号 第8菊星タワービル3階 3rd Fl. No.8 Kikuboshi Tower Building, 20-18, Asakusabashi 3-chome Taito-ku, Tokyo 111-0053 Japan 03-5820-0535	IV-1-1en				
東京都 台東区 浅草橋3丁目20番18号 第8菊星タワービル3階 3rd Fl. No. 8 Kikuboshi Tower Building, 20-18, Asakusabashi 3-chome Taito-ku, Tokyo 111-0053 Japan 03-5820-0535					
送草橋3丁目20番18号 第8菊星タワービル3階 3rd Fl. No.8 Kikuboshi Tower Building, 20-18, Asakusabashi 3-chome Taito-ku, Tokyo 111-0053 Japan 03-5820-0535		•			
TV-1-2en Address: 3rd Fl. No. 8 Kikuboshi Tower Building, 20-18, Asakusabashi 3-chome Taito-ku, Tokyo 111-0053 Japan 03-5820-0535					
Asakusabashi 3-chome Taito-ku, Tokyo 111-0053 Japan 03-5820-0535	IV-1-2en	Address:			
Taito-ku, Tokyo 111-0053 Japan 03-5820-0535	ľ		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
UV-1-3 電話番号 03−5820−0535					
1√-1-3 電話番号 03-5820-0535					
	IV-1-3	電話番号			
1. / / - N M V	IV-1-4				
			00 00L0 0011		

v	国の指定	
V-1	広域特許	AP: GH GM KE LS MW MZ SD SL SZ TZ UG ZW
	(他の種類の保護又は取扱いを	及びハラレプロトコルと特許協力条約の締約国で
	求める場合には括弧内に記載す	ある他の国
	る。)	EA: AM AZ BY KG KZ MD RU TJ TM
		及びユーラシア特許条約と特許協力条約の締約国
		である他の国
	·	EP: AT BE CH&LI CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT
		LU MC NL PT SE TR
		及びヨーロッパ特許条約と特許協力条約の締約国
		である他の国
		OA: BF BJ CF CG CI CM GA GN GW ML MR NE SN TD
		TG.
		及びアフリカ知的所有権機構と特許協力条約の締
		約国である他の国
V-2	国内特許	AE AG AL AM AT AU AZ BA BB BG BR BY BZ CA
	(他の種類の保護又は取扱いを	CH&LI CN CR CU CZ DE DK DM DZ EE ES FI GB GD
	求める場合には括弧内に記載す る。)	GE GH GM HR HU ID IL IN IS KE KG KP KR KZ LC
	30)	LK LR LS LT LU LV MA MD MG MK MN MW MX MZ NO
		NZ PL PT RO RU SD SE SG SI SK SL TJ TM TR TT
		TZ UA UG US UZ VN YU ZA ZW
V-5	指定の確認の宣言	
	出願人は、上記の指定に加えて 、規則4.9(b)の規定に基づき、	A CONTRACTOR AND THE STATE OF T
	特許協力条約のもとで認められ	ASSESSED A CONTRACTOR OF THE C
	る他の全ての国の指定を行う。	
	ただし、V-6欄に示した国の指	
	定を除く。出願人は、これらの	
	追加される指定が確認を条件と していること、並びに優先日か	
	ら15月が経過する前にその確認	
	がなされない指定は、この期間	
	の経過時に、出願人によって取	
	り下げられたものとみなされる ことを宣言する。	
V-6	指定の確認から除かれる国	なし (NONE)
VI-1	先の国内出願に基づく優先	A C (HONE)
	権主張	
VI-1-1	先の出願日	2000年03月02日 (02.03.2000)
VI-1-2	先の出願番号	特願2000-057453
VI-1-3	国名	日本国 JP
VI-2	先の国内出願に基づく優先	
VT-0-1	権主張	
VI-2-1	先の出願日	2001年02月16日(16.02.2001)
VI-2-2	先の出願番号	特願2001-040532
VI-2-3	国名	日本国 JP
VI-3	先の国内出願に基づく優先	
VI-3-1	権主張 先の出願日	2001年02日16日(16 00 0001)
VI-3-2	先の出願番号	2001年02月16日(16. 02. 2001)
VI-3-3	· ·	特願2001-040598
71 3-3	国名	日本国 JP

特許協力条約に基づく国際出願願書 原本(出願用) - 印刷日時 2001年03月01日 (01.03.2001) 木曜日 10時27分41秒

			
VI-4	優先権証明書送付の請求	f .	
	上記の先の出願のうち、右記の	VI-1, VI-2, VI-3	
	番号のものについては、出願書		
	類の認証謄本を作成し国際事務		
	局へ送付することを、受理官庁		
VII-1	に対して請求している。		
A11-1	特定された国際調査機関(IS	日本国特許庁(ISA/JP)	
VIII	A)	H 47 0 14 14	M. / L. E. V. L. # E.
VIII-1	照合欄	用紙の枚数	添付された電子データ
	願書	5	<u> </u>
VIII-2	明細書	52	-
VIII-3	請求の範囲	6	-
VIII-4	要約	1	wa-0602. txt
VIII-5	図面	24	-
VIII-7	合計	88	
	添付書類	添付	添付された電子データ
VIII-8	総刊 音短 手数料計算用紙		
		✓	_
VIII-9	別個の記名押印された委任状		-
VIII-16	PCT-EASYディスク		フレキシブルディスク
VIII-17	その他	納付する手数料に相当す	_
		る特許印紙を貼付した書	
		面	
VIII-17	その他	国際事務局の口座への振	_
			_
VIII-18	新 (4-4-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1	込を証明する書面	
VIII-10	要約書とともに提示する図 の番号	1	
VIII-19	国際出願の使用言語名:	□ == /:	
IX-1	提出者の記名押印	日本語(Japanese)	
17 1	佐田省の記名押印	- 馬海 利	
	. : '		
IX-1-1	氏名(姓名)	渡邊一平写问题	•
	[KA (XIA)	及连一千 5555	
		受理官庁記入欄	
10-1	国際出願として提出された		·
	書類の実際の受理の日		
10-2	図面:		
10-2-1	受理された		
10-2-2	不足図面がある		
10-3	国際出願として提出された		
	書類を補完する書類又は図		
	面であってその後期間内に		
•	提出されたものの実際の受		
10-4	理の日(訂正日)		
10-4	特許協力条約第11条(2)に基		
	づく必要な補完の期間内の 受理の日		
10-5		104/10	
	出願人により特定された国 際調査機関	ISA/JP	•

PAGE BLANK (USPTO)

5/5

特許協力条約に基づく国際出願顧書 原本(出願用) - 印刷日時 2001年03月01日 (01.03.2001) 木曜日 10時27分41秒 ₩A-0602 調査手数料未払いにつき、 国際調査機関に調査用写し を送付していない 10-6 国際事務局記入欄 11-1 記録原本の受理の日

Commence when a

(19) 世界知的所有権機関 国際事務局





(43) 国際公開日 2001 年9 月7 日 (07.09.2001)

PCT.

(10) 国際公開番号 WO 01/64583 A1

(51) 国際特許分類7:

C01B 39/04

(21) 国際出願番号:

PCT/JP01/01562

(22) 国際出願日:

2001年3月1日(01.03.2001)

(25) 国際出願の言語:

日本語

(26) 国際公開の言語:

日本語

(30) 優先権データ:

特願2000-57453

2000 年3 月2 日 (02.03.2000) JP 2001 年2 月16 日 (16.02.2001) JP

特願2001-40532 特願2001-40598

2001年2月16日(16.02.2001)

(71) 出願人 *(*米国を除く全ての指定国について*)*: 日本 碍子株式会社 (NGK INSULATORS, LTD.) [JP/JP]; 〒 467-8530 愛知県名古屋市瑞穂区須田町2番56号 Aichi (JP).

(72) 発明者; および

(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 富田俊弘

(TOMITA, Toshihiro) [JP/JP]. 中村真二 (NAKA-MURA, Shinji) [JP/JP]; 〒467-8530 愛知県名古屋市瑞穂区須田町2番56号 日本碍子株式会社内 Aichi (JP).

(74) 代理人: 渡邉一平(WATANABE, Kazuhira); 〒111-0053 東京都台東区浅草橋3丁目20番18号 第8菊星 タワービル3階 Tokyo (JP).

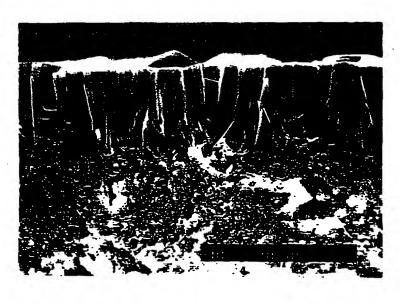
(81) 指定国 (国内): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NO, NZ, PL, PT, RO, RU, SD, SE, SG, SI, SK, SL, TJ, TM, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VN, YU, ZA, ZW.

(84) 指定国 (広域): ARIPO 特許 (GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZW), ユーラシア特許 (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ特許 (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE, TR), OAPI 特許 (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

/続葉有/

(54) Title: ZEOLITE FORMED PRODUCT, ZEOLITE LAMINATE INTERMEDIATE, ZEOLITE LAMINATE COMPOSITE AND METHOD FOR THEIR PREPARATION

(54) 発明の名称: ゼオライト成形体、ゼオライト積層中間体、ゼオライト積層複合体及びそれらの製造方法



(57) Abstract: A porous zeolite formed product comprising a zeolite, characterized in that, in the preparation thereof, a tetrapropyl ammonium ion and a silica sol are used in a mole ratio (TPA/SiO₂) of 0.015 to 0.08, and it has completely crystallized, or in that, in the preparation thereof, a tetrapropyl ammonium ion and a silica sol are used in a mole ratio (TPA/SiO₂) of 0.02 to 0.12, and it is in the course of crystallization. A porous zeolite formed product characterized in that it has an average grain diameter of 1.0 ?m or more and a flexural strength of 1.5 Mpa or more, and exhibits a pressure difference between supply side and permeation side of 1.0 atm or less for a product having a thickness of 1.8 mm, as measured at an amount of permeation of helium of 10 ml/cm². min. A porous zeolite formed product characterized in that, in the observation of the fine structure of a rupture plane, the area of the part wherein individual grains are clearly observed due to

intergranular fracture accounts for 70 % or more of the total area of the rupture plane. In addition of the above, a zeolite laminate having one of the above formed products and, laminated thereon, a film comprising the same or similar zeolite.

WO 01/64583 A



添付公開書類: — 国際調査報告書 2文字コード及び他の略語については、 定期発行される 各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語 のガイダンスノート」を参照。

(57) 要約:

ゼオライトからなる多孔質のゼオライト成形体であって、原料段階でのテトラプロピルアンモニウムイオン (TPA) とシリカゾルとの配合割合 (TPA/SiO2) がモル比で0.015~0.08であり、かつ完全に結晶化したゼオライトからなるゼオライト成形体。又は、原料段階でのTPA/SiO2がモル比で0.02~0.12であり、かつ結晶化途上のゼオライトからなるゼオライト成形体。

平均粒子径が1.0μm以上、曲げ強度が1.5MPa以上、かつ、その肉厚を1.8mmとしたときの、ヘリウムガスの透過量10ml/cm²·minにおける供給側圧力と透過側圧力との差が、1.0気圧以下であるゼオライト成形体。

成形体の破断面の微構造観察において、ゼオライト成形体を構成する粒子のうち、粒界破壊することにより個々の粒子が明瞭に観察される部分の面積が、全破断面積の70%以上であるゼオライト成形体。

及び、上記成形体上に、更に、同一、又は類似のゼオライト膜を積 層したゼオライト積層体。 WO 01/64583 PCT/JP01/01562

明細書

ゼオライト成形体、ゼオライト積層中間体、ゼオライト積層複合体及びそれらの 製造方法

技術分野

本発明は、ゼオライト成形体、ゼオライト積層中間体、ゼオライト積層複合体 及びそれらの製造方法に関する。さらに詳しくは、クラックを発生させることな くその上にゼオライト膜を形成かつ維持し得るとともに、分子ふるい膜等のガス 分離膜や浸透気化膜として用いた場合、圧力損失の減少及び機械的強度の維持向 上のいずれをも満足するゼオライト成形体、このゼオライト成形体上に鋳型剤を 含有するゼオライト膜を積層したゼオライト積層中間体、このゼオライト積層中 間体を仮焼して形成したゼオライト積層複合体及びそれらの効率的な製造方法に 関する。

背景技術

近年、ゼオライトからなる粒子から構成されたゼオライト成形体は、触媒、触媒担体、吸着剤等に広く用いられるようになっている。また、多孔質のセラミックスや金属等の上にゼオライト膜を積層、形成したゼオライト積層複合体は、分子ふるい膜(ガス分離膜、浸透気化膜)に用いられるようになっている。このような状況に伴い、種々の多孔質基体を用いたゼオライト積層複合体及びそれらの製造方法が提案されている。

例えば、ゼオライト膜の基体として、ガラス、ムライト、コーディエライト系 セラミックス、アルミナ、シリカ等を用いる方法、また、金属その他の基材に無 機質を被覆したもの等を用いる方法が提案されている(特開昭59-21361 5号公報)。

また、かご型ゼオライトの薄膜を金属、無機物又は高分子物質の多孔質支持体の一表面に合体してなる複合体が提案されている(特開昭60-28826号公報)。その中で、支持体としては、特に、ゲル物質と親和性の高いものを用いることが好ましいことが提案され、具体的には、コーニンググラスワークス社製の商

品名: No. 7930又は一般にバイコールガラスと称されるものを用いることが特に好ましいことが提案されている。

また、基体としてのモノリシックセラミック支持体の表面にゼオライトを結晶 化する方法に関するもので、45-4質量%シリカ、8-45質量%アルミナ、 及び7-20質量%マグネシアからなる酸化物組成を有するモノリシック支持体 が提案され(特開平1-148771号公報)、具体的には、きん青石、ガラス、 又はガラスセラミックの焼結モノリシック支持体が提案されている。

また、A型又はフォージャサイト型ゼオライト膜の製造方法に関するもので、酸化けい素を主成分とする物質からなる基板を用いる方法が提案されている(特開平6-32610号公報)。この方法は、ゼオライト膜の基板への密着性が悪い問題を改善することを目的とするものであり、基板自体としてゼオライト膜の原料を用い、かつその構成上基板表面がゼオライト膜化されることになるため、合成と添着を同時に進行させることができ、工程を簡略化することができる。具体的には、ほうけい酸ガラス、石英ガラス、シリカアルミナ、ムライト等からなる基板が提案されている。

また、担持ゼオライト膜の生成方法及び得られた膜に関するもので、担体として、アルミナ、ジルコニア又は酸化チタンをベースとするセラミック物質、金属、炭素、シリカ、ゼオライト、粘土及びポリマーからなる群から選ばれる無機、有機又は混合物質からなるものが提案されている(特開平9-173799号公報)。

また、ゼオライト化処理を施される多孔質セラミック基体が、所定寸法の多くの内部孔を備え、5MPa以上の圧縮破壊強度を有するゼオライト多孔質体が提案されている(特開平11-292651号公報)。

このように、従来から、基体上にゼオライト膜を積層、形成してなる種々のゼ オライト積層複合体が提案されているが、これらの複合体においては、次のよう な問題がある。

すなわち、第16図に示すように、ゼオライトの熱膨張係数は200℃ぐらいまでは非常に小さい値であるが、その後高温になると負の係数を示すという、非常に複雑な挙動をする。このため、ゼオライト膜を200℃を超える温度で使用する場合には、基体、例えば、アルミナ質基体との熱膨張差が極端に大きくなり、

ゼオライト膜に熱応力によるクラックを生ぜしめることになる。

また、ゼオライト膜の種類によっては、合成時に鋳型剤又は結晶化促進剤を添加する必要があるものがある。鋳型剤入りのゼオライト膜は500℃程度で仮焼して鋳型剤を除去するが、第17図のMFI型ゼオライトの熱膨張曲線に示すように、鋳型剤入りのゼオライト膜の熱膨張挙動(第17図の仮焼前の熱膨張曲線)は鋳型剤なしのゼオライト膜の熱膨張挙動(第17図の仮焼後の熱膨張曲線)とは極端に異なることから、例えば、アルミナ質基体等の基体との熱膨張差が極端に大きくなり、仮焼時においてゼオライト膜に熱応力によるクラックが生じることになる。

このような問題に対しては、上述の従来の提案例では十分な対応をすることができなかった。

また、基体とゼオライト膜とを二層構造としたものとして、所定厚さの実質的にモレキュラーシーブ結晶のみで形成されたマクロ多孔質層と、所定厚さ及び所定細孔有効径の実質的にマクロ多孔質層の材質と同一種類のモレキュラーシーブ結晶のみで形成された分子分離用の上層とからなる非対称な膜(特表平7-505333号公報)、担体、中間層及び上層の3層からなり、中間層及び上層が所定の結晶性モレキュラーシーブを含有する構造(特表平11-511685号公報)、及び鋳型剤を含有するゼオライトゼオライト成形体上に鋳型剤を含有するゼオライト膜を被覆した後仮焼して膜と基体から同時に鋳型剤を除去するゼオライト複合膜(国際公開番号WO00/23378)が提案されている。これらの膜や構造は、細孔のサイズを正確に調節することができ、また、クラックの発生を有効に防止することができる等の面において、それぞれ優れたものである。

しかしながら、前述の基体から同時に鋳型剤を除去するゼオライト複合膜(国際公開番号WOOO/23378)で得られるゼオライトゼオライト成形体は、その元となる原料(乾燥ゲル)を、シリカゾルとテトラプロピルアンモニウムヒドロキシド(TPAOH)との調製液を撹拌混練することにより得ているため、得られる乾燥ゲルは、粒子径の大きさの不均質、乾燥状態の不均質等を生じやすいことから、結晶化処理後の微構造においてゼオライト粒子に粗密部分や脱粒部分を生じやすく、必ずしも十分に満足し得るものではなかった。

WO 01/64583 PCT/JP01/01562

4

また、乾燥ゲル中にテトラプロピルアンモニウム(TPA)のような鋳型剤を 予め分散させ、これを水蒸気処理でゼオライトに転換させる方法に関しては、乾 燥ゲルの作製工程として、従来、ゲルと鋳型剤との混合液を、それらが乾燥する まで撹拌することが必要であると考えられていたことから、ゲルと鋳型剤との混 合液を80℃程度に加熱し水分を蒸発させた後に十分な乾燥が実現するまで撹拌 (混練)を継続する工程が一般的に採用されてきた(N. Jappar, Q. X ia, and T. Tatsumi, J. Catal. 180, 132-141 (1998), R. Bandyopadhyay et al., Micropo r. Mater. 32 (1999) 81-91、松方正彦, P. R. H. Pra sad Rao, 上山惟一, 第11回ゼオライト研究発表会講演予稿集、A22. 松山(1995)、松方正彦,P. R. H. Prasad Rao, 第12回ゼオ ライト研究発表会講演予稿集, A18, 上智 (1996)、P. R. Hari P rasad Rao & M. Matsukata, Chem. Commun. (1 996) p1441-1442, PR. Hari Prasad Rao, K. Ueyama, M. Matsukata, Appl. Catal. A:Gene ral 166 (1998) 97-103等)。

しかし、このような乾燥ゲルの作製工程を含む方法は工程が煩瑣になり量産化に適するものではなく、また、得られる乾燥ゲルは、上述の国際公開番号WOO 0/23378における場合と同様に、粒子径の大きさの不均質、乾燥状態の不均質等を生じやすいことから、結晶化処理後の微構造においてゼオライト粒子に粗密部分や脱粒部分を生じやすく必ずしも十分に満足し得るものではなかった。

また、これらの膜や構造(ゼオライト積層複合体)を分子ふるい膜等のガス分離膜や浸透気化膜として用いる場合には、膜や基体内を気液が通過する時の圧力損失を減少させて、その使用効率を向上させる必要がある。圧力損失を減少させるために圧力損失の増加をもたらす原因となる基体の粒子の緻密部分を減少させたり、基体の粒子寸法を大にすると、ゼオライト膜を支持する基体としての機械的強度が低下する(基体における圧力損失の減少と機械的強度の向上とは二律背反の関係にある)ことから、圧力損失の減少と機械的強度の維持向上のいずれをも満足するものを得るのは極めて困難であり、そのようなものは未だ得られてい

ないのが現状である。

本発明は上述の問題に鑑みてなされたものであり、クラックを発生させることなくその上にゼオライト膜を形成かつ維持し得るとともに、分子ふるい膜等のガス分離膜や浸透気化膜として用いた場合、圧力損失の減少及び機械的強度の維持向上のいずれをも満足するゼオライト成形体、このゼオライト成形体上に鋳型剤を含有するゼオライト膜を積層したゼオライト積層中間体、ゼオライト積層中間体を仮焼して形成したゼオライト積層複合体及びそれらの効率的な製造方法を提供することを目的とする。

発明の開示

上述の目的を達成するため、本発明によって、以下のゼオライト成形体、ゼオライト積層中間体、ゼオライト積層複合体及びそれらの製造方法が提供される。

- [1] ゼオライトからなる多孔質のゼオライト成形体であって、テトラプロピルアンモニウムイオン(TPA)とシリカゾルとの配合割合(TPA/SiO_2)がモル比で0.015~0.08であり、かつ完全に結晶化したゼオライトからなることを特徴とするゼオライト成形体。
- [2] ゼオライトからなる多孔質のゼオライト成形体であって、

テトラプロピルアンモニウムイオン(TPA)とシリカゾルとの配合割合(TPA/SiO $_2$)がモル比で $_1$ 0.02~ $_2$ 0.12であり、かつ結晶化途上のゼオライトからなることを特徴とするゼオライト成形体。

- [3] 前記[1] 又は[2] に記載のゼオライト成形体が鋳型剤を含有するものであり、その上に同一又は類似の組成の鋳型剤を含有するゼオライト膜が積層されてなることを特徴とするゼオライト積層中間体。
- [4] 前記[3]に記載のゼオライト積層中間体を仮焼して前記ゼオライト成 形体及び前記鋳型剤を含有するゼオライト膜から前記鋳型剤を除去することによ り形成された、前記ゼオライト成形体上に前記ゼオライト膜が積層されてなるこ とを特徴とするゼオライト積層複合体。
- [5] テトラプロピルアンモニウムイオン (TPA) とシリカゾルとの配合割合 (TPA/SiO₂) がモル比で 0.015~0.08であり、かつ完全に結晶

WO 01/64583 PCT/JP01/01562

化したゼオライトからなるとともに、鋳型剤を含有するゼオライト成形体の上に、同一又は類似の組成のゼオライト膜を積層した後仮焼して、前記ゼオライト膜及び前記ゼオライト成形体から同時に鋳型剤を除去し、前記ゼオライト成形体上に前記ゼオライト膜を積層したゼオライト積層複合体を得ることを特徴とするゼオライト積層複合体の製造方法。

- [6] テトラプロピルアンモニウムイオン(TPA)とシリカゾルとの配合割合(TPA/SiO_2)がモル比で $0.02\sim0.12$ であり、かつ結晶化途上のゼオライトからなるとともに、鋳型剤を含有するゼオライト成形体上に、同一又は類似の組成のゼオライト膜を積層した後仮焼して、前記ゼオライト膜及び前記ゼオライト成形体から同時に鋳型剤を除去し、前記ゼオライト成形体上に前記ゼオライト膜を積層したゼオライト積層複合体を得ることを特徴とするゼオライト積層複合体の製造方法。
 - [7] ゼオライトからなる多孔質のゼオライト成形体であって、

平均粒子径が 1.0μ m以上、曲げ強度が 1.5 MP a 以上、かつ、その肉厚を 1.8 mm としたときの、ヘリウムガスの透過量 10 ml l $cm^2 \cdot min$ における供給側圧力と透過側圧力との差が、 1.0 気圧以下であることを特徴とするゼオライト成形体。

- [8] 前記[7]に記載のゼオライト成形体が鋳型剤を含有するものであり、 その上に同一又は類似の組成の鋳型剤を含有するゼオライト膜が積層されてなる ことを特徴とするゼオライト積層中間体。
- [9] 前記[8]に記載のゼオライト積層中間体を仮焼して前記ゼオライト成形体及び前記鋳型剤を含有するゼオライト膜から前記鋳型剤を除去することにより形成された、前記ゼオライト成形体上に前記ゼオライト膜が積層されてなることを特徴とするゼオライト積層複合体。
- [10] シリカゾルに、テトラプロピルアンモニウムヒドロキシド(TPAO H)溶液及びテトラプロピルアンモニウムブロミド(TPABr)を、これらのテトラプロピルアンモニウムイオン(TPA)の全量に対するテトラプロピルアンモニウムヒドロキシド(TPAOH)及びテトラプロピルアンモニウムブロミド(TPABr)のそれぞれの配合割合 [TPAOH/ (TPAOH+TPAB

- r)、及びTPAB r / (TPAOH+TPAB r)] が、〇~99モル%及び1 〇〇~1モル%となるように調整して添加し、得られた調製液を混練して乾燥し、 得られた乾燥ゲルを成形、結晶化処理することを特徴とするゼオライト成形体の 製造方法。
- [11] シリカゾルに、テトラプロピルアンモニウムヒドロキシド(TPAO H) 溶液を添加し、得られた調製液を噴霧して、乾燥し、得られた乾燥ゲルを成形、結晶化処理することを特徴とするゼオライト成形体の製造方法。
- [12] シリカゾルに、テトラプロピルアンモニウムヒドロキシド(TPAO H)溶液及びテトラプロピルアンモニウムブロミド(TPABr)を、これらのテトラプロピルアンモニウムイオン(TPA)の全量に対するテトラプロピルアンモニウムヒドロキシド(TPAOH)及びテトラプロピルアンモニウムブロミド(TPABr)のそれぞれの配合割合 [TPAOH/(TPAOH+TPABr)、及びTPABr/(TPAOH+TPABr)]が、0~99モル%及び100~1モル%となるように調整して添加し、得られた調製液を混練して乾燥し、得られた乾燥ゲルを成形、結晶化処理して、ゼオライト成形体を得、得られた前記ゼオライト成形体を前記調製液と同一又は類似の組成の溶液に浸漬して、水熱合成して、前記ゼオライト成形体上に鋳型剤を含有するゼオライト膜を形成して、前記ゼオライト成形体と前記鋳型剤を含有するゼオライト膜との積層体を形成することを特徴とするゼオライト積層中間体の製造方法。
- [13] シリカゾルに、テトラプロピルアンモニウムヒドロキシド(TPAO H) 溶液を添加し、得られた調製液を噴霧して乾燥し、得られた乾燥ゲルを成形、結晶化処理して、ゼオライト成形体を得、得られた前記ゼオライト成形体を前記調製液と同一又は類似の組成の溶液に浸漬して、水熱合成して、前記ゼオライト成形体上に鋳型剤を含有するゼオライト膜を形成して、前記ゼオライト成形体と前記鋳型剤を含有するゼオライト膜との積層体を形成することを特徴とするゼオライト積層中間体の製造方法。
- [14] シリカゾルに、テトラプロピルアンモニウムヒドロキシド(TPAO H) 溶液及びテトラプロピルアンモニウムブロミド(TPABr)を、これらのテトラプロピルアンモニウムイオン(TPA)の全量に対するテトラプロピルア

WO 01/64583

ンモニウムヒドロキシド(TPAOH)及びテトラプロピルアンモニウムブロミド(TPABr)のそれぞれの配合割合[TPAOH/(TPAOH+TPABr)、及びTPABr/(TPAOH+TPABr)]が、0~99モル%及び100~1モル%となるように調整して添加し、得られた調製液を混練して乾燥し、得られた乾燥ゲルを成形、結晶化処理して、ゼオライト成形体を得、得られた前記ゼオライト成形体を前記調製液と同一又は類似の組成の溶液に浸漬して、水熱合成して、前記ゼオライト成形体上に鋳型剤を含有するゼオライト膜を形成して、前記ゼオライト成形体と前記鋳型剤を含有するゼオライト膜との積層体を形成するとともに、この積層体を仮焼して鋳型剤を同時に除去することを特徴とするゼオライト積層複合体の製造方法。

- [15] シリカゾルに、テトラプロピルアンモニウムヒドロキシド(TPAO H)溶液を添加し、得られた調製液を噴霧して乾燥し、得られた乾燥ゲルを成形、結晶化処理して、ゼオライト成形体を得、得られた前記ゼオライト成形体を前記調製液と同一又は類似の組成の溶液に浸漬して、水熱合成して、前記ゼオライト成形体上に鋳型剤を含有するゼオライト膜を形成して、前記ゼオライト成形体と前記鋳型剤を含有するゼオライト膜との積層体を形成するとともに、この積層体を仮焼して鋳型剤を同時に除去することを特徴とするゼオライト積層複合体の製造方法。
- [16] ゼオライトからなる粒子から構成された多孔質のゼオライト成形体であって、成形体の破断面の微構造観察において、前記ゼオライト成形体を構成する粒子のうち粒界破壊することにより個々の粒子が明瞭に観察される部分(健全部)の面積が、全破断面積の70%以上を占有することを特徴とするゼオライト成形体。
- [17] 前記[16]に記載のゼオライト成形体が鋳型剤を含有するものであり、その上に同一又は類似の組成の鋳型剤を含有するゼオライト膜が積層されてなることを特徴とするゼオライト積層中間体。
- [18] 前記[17]に記載のゼオライト積層中間体を仮焼して前記ゼオライト成形体及び前記鋳型剤を含有するゼオライト膜から前記鋳型剤を除去することにより形成された、前記ゼオライト成形体上にゼオライト膜が積層されてなるこ

とを特徴とするゼオライト積層複合体。

[19] シリカゾルに、テトラプロピルアンモニウムヒドロキシド(TPAOH)溶液を、テトラプロピルアンモニウムイオン(TPA)と前記シリカゾルとの配合割合(TPA/SiO_2)がモル比で $0.015\sim0.08$ となるように添加し、得られた調製液を混練して乾燥し、得られた乾燥ゲルを湿式粉砕し、得られたスラリーを噴霧して、乾燥し、得られた乾燥ゲル造粒物を成形、結晶化処理することを特徴とするゼオライト成形体の製造方法。

[20] シリカゾルに、テトラプロピルアンモニウムヒドロキシド(TPAOH)溶液を、テトラプロピルアンモニウムイオン(TPA)と前記シリカゾルとの配合割合(TPA/SiO_2)がモル比で $0.015\sim0.08$ となるように添加し、得られた調製液を噴霧して、乾燥し、得られた乾燥ゲルを成形、結晶化処理することを特徴とするゼオライト成形体の製造方法。

[21] シリカゾルに、テトラプロピルアンモニウムヒドロキシド(TPAOH) 溶液を、テトラプロピルアンモニウムイオン(TPA)と前記シリカゾルとの配合割合(TPA/SiO_2)がモル比で $0.015\sim0.08$ となるように添加し、得られた調製液を混練して乾燥し、得られた乾燥ゲルを湿式粉砕し、得られたスラリーを噴霧、乾燥し、乾燥ゲル造粒物を成形、結晶化処理して、ゼオライト成形体を得、得られた前記ゼオライト成形体を前記調製液と同一又は類似の組成の溶液に浸漬し、水熱合成して、前記ゼオライト成形体上に鋳型剤を含有するゼオライト膜を形成して、前記ゼオライト成形体と前記鋳型剤を含有するゼオライト膜との積層体を形成することを特徴とするゼオライト積層中間体の製造方法。

[22] シリカゾルに、テトラプロピルアンモニウムヒドロキシド(TPAOH)溶液を、テトラプロピルアンモニウムイオン(TPA)と前記シリカゾルとの配合割合(TPA/SiO_2)がモル比で $0.015\sim0.08$ となるように添加し、得られた調製液を噴霧して、乾燥し、得られた乾燥ゲルを成形、結晶化処理して、ゼオライト成形体を得、得られた前記ゼオライト成形体を前記調製液と同一又は類似の組成の溶液に浸漬し、水熱合成して、前記ゼオライト成形体上に鋳型剤を含有するゼオライト膜を形成して、前記ゼオライト成形体と前記鋳型剤

を含有するゼオライト膜との積層体を形成することを特徴とするゼオライト積層 中間体の製造方法。

[23] シリカゾルに、テトラプロピルアンモニウムヒドロキシド(TPAOH)溶液を、テトラプロピルアンモニウムイオン(TPA)と前記シリカゾルとの配合割合(TPA/SiO_2)がモル比で0.015~0.08となるように添加し、得られた調製液を混練して乾燥し、得られた乾燥ゲルを湿式粉砕し、得られたスラリーを噴霧、乾燥し、得られた乾燥ゲル造粒物を成形、結晶化処理して、ゼオライト成形体を得、得られた前記ゼオライト成形体を前記調製液と同一又は類似の組成の溶液に浸漬し、水熱合成して、前記ゼオライト成形体上に鋳型剤を含有するゼオライト膜を形成して、前記ゼオライト成形体と前記鋳型剤を含有するゼオライト膜との積層体を形成するとともに、この積層体を仮焼して鋳型剤を同時に除去することを特徴とするゼオライト積層複合体の製造方法。

[24] シリカゾルに、テトラプロピルアンモニウムヒドロキシド(TPAOH) 溶液を、テトラプロピルアンモニウムイオン(TPA)と前記シリカゾルとの配合割合(TPA/SiO_2)がモル比で $0.015\sim0.08$ となるように添加し、得られた調製液を噴霧して、乾燥し、得られた乾燥ゲルを成形、結晶化処理して、ゼオライト成形体を得、得られた前記ゼオライト成形体を前記調製液と同一又は類似の組成の溶液に浸漬し、水熱合成して、前記ゼオライト成形体上に鋳型剤を含有するゼオライト膜を形成して、前記ゼオライト成形体と前記鋳型剤を含有するゼオライト膜との積層体を形成するとともに、この積層体を仮焼して鋳型剤を同時に除去することを特徴とするゼオライト積層複合体の製造方法。

図面の簡単な説明

第1図は、第1の発明の実施例12で得られたゼオライト積層中間体の破断面の微構造を示すSEM写真である。第2図は、MFI型ゼオライト膜であることを示すX線回折結果を示すグラフである。

第3図は、第2の発明の実施例14~19及び比較例16で得られたゼオライト成形体におけるテトラプロピルアンモニウムブロミド(TPABr)のテトラプロピルアンモニウムイオン(TPA)の全量、すなわち(TPAOH+TPA

Br)に対する配合割合 [TPABr/(TPAOH+TPABr)] と平均粒子径との関係を示すグラフである。第4図~第8図は、第2の発明の実施例14~18で得られたゼオライト成形体の破断面の微構造を示すSEM写真である。第9図は、第2の発明の実施例14~19及び比較例16で得られたゼオライト成形体におけるテトラプロピルアンモニウムブロミド(TPABr)のテトラプロピルアンモニウムブロミド(TPABr)のテトラプロピルアンモニウムイオン(TPA)の全量に対する配合割合(TPABr/TPA)と曲げ強度との関係を示すグラフである。第10図は、第2の発明の実施例14~19及び比較例16で得られたゼオライト成形体における平均粒子径と四点曲げ強度との関係を示すグラフである。第11図は、第2の発明の実施例14~20及び比較例16で得られたゼオライト成形体における平均粒子径と圧力損失との関係を示すグラフである。第12図~第14図は、第2の発明の実施例19~20及び比較例16で得られたゼオライト成形体の破断面の微構造を示すSEM写真である。第15図は、浸透気化法によるクラック測定方法を示す説明図である。

第16図は、MFI型ゼオライトの熱膨張曲線を示すグラフである。第17図は、MFI型ゼオライト(仮焼前及び仮焼後)及びアルミナの熱膨張曲線を示すグラフである。第18図は、平均粒子径の測定方法を示すSEM写真である。第19図は、平均粒子径の測定方法を示すSEM写真のレプリカ図である。第20図は、平均粒子径の測定方法を示す説明図である。第21図は、圧力損失の測定方法を示す説明図である。第21図は、圧力損失の測定方法を示す説明図である。第22図は、第2の発明の実施例21で得られたゼオライト積層中間体の破断面の微構造を示すSEM写真である。

第23図は、第3の発明の実施例23で得られたスラリーの粒度分布を示すグラフである。第24図は、第3の発明の実施例23で得られた乾燥ゲル造粒粉の外表面の微構造を示すSEM写真である。第25図~第26図は、第3の発明の実施例23で得られたゼオライト成形体の破断面の微構造を示すSEM写真である。第27図は、第3の発明の実施例24で得られた乾燥ゲルの外表面の微構造を示すSEM写真である。第28図~第29図は、第3の発明の実施例24で得られたゼオライト成形体の破断面の微構造を示すSEM写真である。第30発明の比較例17で得られた乾燥ゲルの外表面の微構造を示すSEM写真

である。第31図及び第32図は、第3の発明の比較例17で得られたゼオライト成形体の破断面の微構造を示すSEM写真である。第33図は、ゼオライト成形体の破断面における均質度の測定方法を示すSEM写真である。第34図は、ゼオライト成形体の破断面における均質度の測定方法を示すSEM写真のレプリカ図である。第35図は、第3の発明の実施例25で得られたゼオライト積層中間体の破断面の微構造を示すSEM写真である。

発明を実施するための最良の形態

本発明のゼオライト成形体は、基体として、その上にゼオライト膜を積層、形成したゼオライト積層複合体として分子ふるい膜等のガス分離膜や浸透気化膜等に有効に用いられるものであるから、その上に積層、形成されるゼオライト膜にクラックが発生するのを防止し得るものである必要がある。このため、本発明のゼオライト成形体は、その上にゼオライト膜を積層してゼオライト積層複合体を得るために用いる場合には、その上に積層されるゼオライト膜と同一又は類似の組成のゼオライトからなる粒子から構成された多孔質ゼオライトであることが好ましい。

特に、鋳型剤等を用いてゼオライト積層複合体を形成する場合、鋳型剤入りのゼオライト膜の熱膨張挙動が、第17図に示すように、鋳型剤なしのゼオライト膜に比して極端に異なることに鑑み、単にその熱膨張係数がゼオライト膜のそれと近似する基体(例えば、石英ガラス等)とするだけでは、鋳型剤を除去するために500℃程度で仮焼する際の熱膨張差を解消することができずに、ゼオライト膜にクラックを生じさせることから、本発明のゼオライト成形体は、鋳型剤を含めた全ての含有組成の面において、ゼオライト膜と同一又は類似の組成の多孔質のゼオライトであることが好ましい。

本発明のゼオライト成形体は、ゼオライトからなる多孔質のゼオライト成形体であって、テトラプロピルアンモニウムイオン(TPA)とシリカゾルとの配合割合(TPA/SiO_2)がモル比で0.015~0.08であり、かつ完全に結晶化したゼオライトからなること、又はゼオライトからなる多孔質のゼオライト成形体であって、テトラプロピルアンモニウムイオン(TPA)とシリカゾルと

の配合割合 (TPA/SiO_2) がモル比で $0.02\sim0.12$ であり、かつ結晶 化途上のゼオライトからなることを特徴とする (以下、この発明を「第1の発明」ということがある)。

これにより、第1の発明のゼオライト成形体は、その強度を1.5MPa以上に向上させることができるため、水熱環境下でも破壊することなくその上にゼオライト膜を形成することができることに加えて、ゼオライト膜を形成した後もゼオライト膜を破壊することなく、膜の機能を保持することができる。

ここで、ゼオライトの結晶相に関して、「完全に結晶化したゼオライト」とは、 X線回折において、20~30°(Cu Kα)の領域にかけてゼオライトを示す 全ての鋭いピークが明瞭に認められ、ハローがないものを意味し、また、「結晶化 途上のゼオライト」とは、同様のX線回折において、わずかでもゼオライトのピ ークが認められたものを意味し、この場合、X線的に、後述の非晶質を示すハロ ーと、ゼオライトを示す鋭いピークとが重なった複合波形となっている。なお、 上述のもの以外の、ブロードなハローのみで明確なピークを確認することができ ないものは「非晶質のゼオライト」を意味する。

また、第1の発明のゼオライト積層中間体は、上述のゼオライト成形体が鋳型 剤を含有するものであり、その上に同一又は類似の組成の鋳型剤を含有するゼオ ライト膜が積層されてなることを特徴とする。

さらに、第1の発明のゼオライト積層複合体は、上述のゼオライト積層中間体 を仮焼してゼオライト成形体及び鋳型剤を含有するゼオライト膜から鋳型剤を除 去することにより形成された、ゼオライト成形体上にゼオライト膜が積層されて なることを特徴とする。

第1の発明に用いられるゼオライトとしては特に制限はないが、例えば、熱膨 張が非直線的な異常な挙動を示す、MFI、AFI、DDR等

(ParkS.H.etal.Stud.Surf.Sci.Catal.1997,105,1989-1994 を参照) は、これらの ゼオライトを用いたゼオライト膜と基体であるゼオライト成形体とからゼオライ ト積層複合体を構成したときに、ゼオライト膜のクラックの発生を防止すること は通常困難であることから、第1の発明において効果的に用いられることになる。 また、ゼオライト膜を形成するときに鋳型剤を必要とする場合、その鋳型剤と しては、例えば、MFIからなるゼオライト膜に含有させるテトラプロピルアンモニウムの水酸化物(テトラプロピルアンモニウムヒドロキシド(TPAOH))や臭化物(テトラプロピルアンモニウムブロミド(TPABr))、BEAからなるゼオライト膜に含有させるテトラエチルアンモニウム(TEA)の水酸化物や臭化物等を挙げることができるが、このような鋳型剤を含有させたゼオライト膜と鋳型剤を含有させないゼオライト膜との熱膨張挙動は、第17図に示すように大きな相違がある。

従って、第1の発明のゼオライト成形体としては、ゼオライトとしてMFI、AFI、DDR等であって鋳型剤を含有したものを用いて、ゼオライト膜をその上に積層、形成したゼオライト積層複合体用に用いる場合は、ゼオライト膜と同じ鋳型剤を含有することをも含め同一又は類似組成のゼオライトから構成されたものとし、ゼオライトとしてMFI、AFI、DDR等であって鋳型剤を含まないゼオライト膜をその上に積層、形成したゼオライト積層複合体用に用いる場合には、同様に鋳型剤を含有しないことをも含め同一又は類似組成のゼオライトから構成されたものとすることが好ましい。

また、第1の発明のゼオライト積層複合体の製造方法は、テトラプロピルアンモニウムイオン(TPA)とシリカゾルとの配合割合(TPA/SiO_2)がモル比で $0.015\sim0.08$ であり、かつ完全に結晶化したゼオライト、又は配合割合(TPA/SiO_2)がモル比で $0.02\sim0.12$ であり、かつ結晶化途上のゼオライトからなるからなるとともに、鋳型剤を含有するゼオライト成形体の上に、同一又は類似の組成のゼオライト膜を積層した後仮焼して、ゼオライト膜及び前記ゼオライト成形体から同時に鋳型剤を除去し、ゼオライト成形体上にゼオライト膜を積層したゼオライト積層複合体を得ることを特徴とする。

ゼオライト成形体の上にゼオライト膜を積層する方法としては、従来公知の方 法が採用でき、例えば、水熱合成法、気相輸送法等を用いることができる。

また、ゼオライト成形体の製造方法としては、次の方法が知られており、いずれも用いることができる。すなわち、

- (1) ゼオライト粉末をバインダで固める方法
- (2) ゼオライト粉末をバインダで固めた後、化学処理でバインダをゼオライト

に転化させる方法

(3) ゼオライト前駆体を成形し加熱処理でゼオライトに転化させる方法

上記(1)のバインダ添加法においては、ゼオライトにシリカゾル等のゾルを添加する方法(特開平2-4445号公報参照)や、ゼオライトにアタパルジャイト系粘土及びカルボキシルメチルセルロースを添加する方法(特開平10-81511号公報参照)を挙げることができる。

上記(2)のバインダレス法においては、ゼオライトにカオリンを添加混合後、焼成し、次いでアルカリ水熱処理することにより、カオリンをゼオライトに転移させる方法(特開平10-101326号公報参照)や、ゼオライトとメタカオリンを混合し、アルカリ処理することにより、メタカオリンをゼオライトに転換させる方法(特開昭52-103391号公報参照)等がある。

さらに、上記(3)のゼオライト固相合成法においては、カネマイトにテンプレート(鋳型剤)を混合して、無定形珪酸塩粉末を得、これを成形後加熱処理することにより、MFI等のゼオライトを得る方法(特許第2725720号公報参照)や、TEOSにテンプレートを混合したものを加水分解した後乾燥して無定形珪酸塩粉末を得、これを成形し加熱処理することにより、ゼオライトを得る方法(Shimizu,S.,Kiyozumi Y.& Mizukami F.Chem.Lett.,1996,403-404を参照)等を挙げることができる。

本発明のゼオライト成形体は、ゼオライトからなる多孔質のゼオライト成形体であって、平均粒子径が1.0μm以上、曲げ強度が1.5MPa以上、かつ、その肉厚を1.8mmとしたときの、ヘリウムガス透過量10ml/cm²・minにおける供給側圧力と透過側圧力との差が、1.0気圧以下であることを特徴とするものである(以下、この発明を「第2の発明」ということがある)。

第2の発明に用いられるゼオライト、また、ゼオライト膜を形成するときに鋳型剤を必要とする場合、その鋳型剤としては、第1の発明の場合と同じものを用いることができる。

第2の発明のゼオライト成形体は、平均粒子径が1.0 μ m以上、好ましくは、2.5 μ m以上、曲げ強度が1.5MPa以上、好ましくは、6.0MPa以上、かつ、その肉厚を1.8mmとしたときの、ヘリウムガス透過量10ml/cm2·

minにおける供給側圧力と透過側圧力との差(圧力損失)が、1.0気圧以下、 好ましくは、0.6気圧以下である。

この条件を満たすことによって、第2の発明のゼオライト成形体は、クラックを発生させることなくその上にゼオライト膜を形成かつ維持し得るとともに、分子ふるい膜等のガス分離膜や浸透気化膜として用いた場合、圧力損失の減少及び機械的強度の維持向上のいずれをも満足するものとなる。

なお、平均粒子径は、画像解析装置により、各粒子の最大長さを測定し、平均化することによって求めた。すなわち、第2の発明のゼオライト成形体の破断面(無作為に抽出した部分)を走査型電子顕微鏡(SEM)により観察し、SEM写真を撮った(第18図)。このSEM写真をベースに白黒に色分けしたレプリカ図を作製した(第19図)。この場合、白の部分は粒子、黒の部分は粒子間の空隙及び粒子不明瞭部を示すが、ゼオライト粒子全体が見える粒子を選ぶようにし、ゼオライト粒子全体が見えない場合には、少なくとも粒子最大径が見える粒子を選んだ。また、粒子同士が重なり合って全体が不明瞭な粒子については測定しないようにした。画像解析は、装置として、画像分析装置(東洋紡績(株)製商品名:イメージアナライザーV10)を用い、レプリカの画像をパソコンに取り込み、測定領域、スケール、及び二値化処理を設定し(レプリカ図の白の部分をゼオライト粒子、黒の部分を粒子間の空隙等の非測定部分として認識させる処理)、第20図(a)~(c)に示す基準で各粒子の最大長さを測定し、平均粒子径を算出した。

また、曲げ強度は、JIS R 1601に準拠して測定した。

さらに、圧力損失は、第21図に示す方法で測定した。

すなわち、第2の発明のゼオライト成形体(直径18mm、厚さ1.8mm) 11と石英ガラス管12とをエポキシ樹脂で接合し、金属(ステンレス)製容器 13内に配設した。室温で、供給ガス14としてヘリウムガスを用い、最高8kgf/cm²まで加圧し、供給ガス14の圧力を圧力計16で、透過ガス15の圧力を圧力計17で、また、透過量を流量計18によってそれぞれ測定した。ヘリウムガスの透過量10ml/cm²・minにおける供給側圧力と透過側圧力との差を圧力損失とした。

なお、多孔質材料の圧力損失は、測定試料の肉厚に比例して増大する(肉厚が 2倍になれば圧力損失も2倍になる)ものであるから、圧力損失の測定では、測 定試料の肉厚を常に同一とするか又は肉厚を考慮して計算により補正をする必要 がある。第2の発明においては、試料の肉厚を1.8mmに揃えて、その形状に おける供給側と透過側との圧力差を測定し、圧力損失とした。

第2の発明のゼオライト成形体の製造方法は、シリカゾルに、テトラプロピルアンモニウムヒドロキシド(TPAOH)溶液及びテトラプロピルアンモニウムブロミド(TPABr)を、これらのテトラプロピルアンモニウムイオン(TPA)とシリカゾルとの配合割合(TPA/SiO_2)が所定のモル比となるように、かつ、テトラプロピルアンモニウムイオン(TPA)の全量に対するテトラプロピルアンモニウムイオン(TPA)の全量に対するテトラプロピルアンモニウムヒドロキシド(TPAOH)及びテトラプロピルアンモニウムブロミド(TPAOH)及びテトラプロピルアンモニウムアロミド(TPAOH)のそれぞれの配合割合 [TPAOH/(TPAOH+TPABr)が、TPAOH0~99年ル%及び100~1モル%となるように調整して添加し、得られた調製液を混練して乾燥し、得られた乾燥ゲルを成形、結晶化処理することを特徴とする。

ここで、テトラプロピルアンモニウムイオン(TPA)とシリカゾルとの配合割合(TPA/SiO_2 モル比)については、モル比 $0.015\sim0.08$ の範囲でゼオライト成形体の平均粒子径は変化せず、また、曲げ強度はゼオライト積層複合体を形成し得る基体として必要な1.5MPa以上(ゼオライト膜の水熱合成環境下で破壊せず、かつ、膜を形成した後も破壊しない強度)を有することから、いずれの範囲で調整してもよい。第<math>2の発明の実施においては、曲げ強度が最大となる TPA/SiO_2 モル比0.04に調整した。

また、調製液の TPA/SiO_2 モル比、及び全量TPAに対するTPAOH、TPABrのそれぞれの配合割合が所定量に保たれていれば、必要に応じpHを調整するために、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム等のアルカリ源を加えてもよい。

次に、調製液を乾燥させるために、調製液をテフロンビーカーに入れマグネティクスターラーで撹拌した後、所定温度に設定した恒温槽で加熱しながらテフロン棒を用いて手動で撹拌混練を継続して、水分を蒸発させて乾燥ゲルを得る。こ

WO 01/64583 PCT/JP01/01562

の時の撹拌混練は、加熱ニーダー等で実施してもよい。

次に、乾燥ゲルの成形は、金型一軸プレス成形(全圧1000kgf)で所定の形状に整えた後、さらに冷間静水圧成形を行って、乾燥ゲル成形体を得る。この時、冷間静水圧成形の圧力は、所望の乾燥ゲル成形体密度となるように700~7000kgf/cm²の範囲で調整することが好ましい。

次に、前述のようにして得た乾燥ゲル成形体を、成形体重量と同重量の蒸留水を入れたテフロン内筒付ステンレス製耐圧容器中に、水と接触しないようにテフロン板の上に配置し、180℃のオーブン中で10時間自生水蒸気圧下で反応させて、結晶化処理し、ゼオライト成形体を得る。この時の蒸留水の量は、使用する耐圧容器容積にて飽和水蒸気圧に達する量の最少量であり、それ以上であれば成形体と蒸留水との関係からの制約はない。また、反応温度及び時間については、130℃以上及び2時間以上で結晶化が進むことからそれ以上の温度及び時間であれば特に制約はない。

また、第2の発明のゼオライト成形体の製造方法は、シリカゾルに、テトラプロピルアンモニウムヒドロキシド(TPAOH)溶液を、これらのテトラプロピルアンモニウムイオン(TPA)とシリカゾルとの配合割合(TPA/SiO_2)が所定のモル比となるように添加し、得られた調製液を噴霧して、乾燥し、得られた乾燥ゲルを成形、結晶化処理を特徴とするものであってもよい。

ここで、調製液を噴霧して乾燥する方法としては、例えば、スプレードライヤー、流動造粒乾燥機等の溶液やスラリーの噴霧乾燥機を挙げることができる。第2の発明における調製液の乾燥には、スプレードライヤーを用いた。調製液は、送液ポンプにより噴霧ノズル先端まで運ばれ、そこで加圧空気によって噴霧された後、乾燥空気が流通した乾燥チャンバ内で乾燥されて回収される。この時、乾燥チャンバ内に流通される空気は、調製液と加圧空気の噴霧口付近で予め180℃に加熱されているが、この温度は、乾燥チャンバの容積によっても変化するものであるから特に限定されるものではない。

ここで、テトラプロピルアンモニウムイオン(TPA)とシリカゾルとの配合 割合(TPA/SiO₂モル比)については、モル比0.015~0.08の範囲 でゼオライト成形体の平均粒子径は変化せず、また、曲げ強度はゼオライト積層 複合体を形成し得る基体として必要な 1. 5 MP a 以上を有することから、いずれの範囲で調整してもよい。第2の発明の実施例においては、曲げ強度が最大となる TPA/S i O_2 モル比 0. 0 4 に調整した。

また、調製液のTPA/SiO₂モル比が所定量に保たれていれば、必要に応じpHを調整するために、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム等のアルカリ源を加えてもよい。

次に、調製液を、前述のような噴霧方法で噴霧し、乾燥して、乾燥ゲルを得る。 次に、乾燥ゲルの成形は、金型一軸プレス成形(全圧1000kgf)で所定 の形状に整えた後、さらに冷間静水圧成形を行って、乾燥ゲル成形体を得る。こ の時、冷間静水圧成形の圧力は、所望の乾燥ゲル成形体密度となるように700 ~7000kgf/cm²の範囲で調整することが好ましい。

次に、前述のようにして得た乾燥ゲル成形体を、成形体重量と同重量の蒸留水を入れたテフロン内筒付ステンレス製耐圧容器中に、水と接触しないようにテフロン板の上に配置し、180℃のオーブン中で10時間自生水蒸気圧下で反応させて、結晶化処理し、ゼオライト成形体を得る。この時の蒸留水の量は、使用する耐圧容器容積にて飽和水蒸気圧に達する量の最少量であり、それ以上であれば成形体と蒸留水との関係からの制約はない。また、反応温度及び時間については、130℃以上及び2時間以上で結晶化が進むことからそれ以上の温度及び時間であれば特に制約はない。

このように、噴霧して乾燥する方法は、前述の混練して乾燥する方法よりも、 乾燥を均質にし、結晶化処理後の微構造を、粗密化及び脱粒から有効に防止する ことができる。

第2の発明のゼオライト積層中間体は、前述のゼオライト成形体が鋳型剤を含有するものであり、その上に同一又は類似の組成の鋳型剤を含有するゼオライト 膜が積層されてなることを特徴とする。

鋳型剤を含有するゼオライト膜の形成方法としては第1の発明の場合と同じ方 法を用いることができる。

また、第2の発明のゼオライト積層複合体は、前述のゼオライト積層中間体を 仮焼してゼオライト成形体及び鋳型剤を含有するゼオライト膜から鋳型剤を除去 することにより形成された、ゼオライト成形体上にゼオライト膜が積層されてなることを特徴とする。

ここで、ゼオライト積層複合体は、分子ふるい膜等のガス分離膜や浸透気化膜等に有効に用いられるものであるから、ゼオライト成形体上に積層される鋳型剤を含有するゼオライト膜や鋳型剤が除去されたゼオライト膜は、ゼオライト成形体が露出することのないよう十分な厚さを必要とし、かつ、緻密な膜でなければならない。また、ゼオライト成形体として鋳型剤を含有するものを用いる場合は、積層される鋳型剤を含有するゼオライト膜は、同じ鋳型剤を含有することを含め同一又は類似組成のゼオライトから構成されたものである必要がある(第1の発明及び後述する第3の発明の場合も同様である)。

第2の発明のゼオライト積層中間体の製造方法は、シリカゾルに、テトラプロピルアンモニウムヒドロキシド(TPAOH)溶液及びテトラプロピルアンモニウムブロミド(TPABr)を、これらのテトラプロピルアンモニウムイオン(TPA)とシリカゾルとの配合割合(TPA/SiO_2)が所定のモル比となるように、かつ、テトラプロピルアンモニウムイオン(TPA)の全量に対するテトラプロピルアンモニウムヒドロキシド(TPAOH)及びテトラプロピルアンモニウムビルアンモニウムビルアンモニウムビルアンモニウムビルアンモニウムビルアンモニウムブロミド(TPAOH)及びTPABr)のそれぞれの配合割合 [TPAOH/(TPAOH+TPABr))が、 $O\sim99$ でか%及び $100\sim1$ モル%となるように調整して添加し、得られた調製液を混練して乾燥し、得られた乾燥ゲルを成形、結晶化処理して、ゼオライト成形体を得、得られたゼオライト成形体を調製液と同一又は類似の組成の溶液に浸漬して、水熱合成して、ゼオライト成形体上に鋳型剤を含有するゼオライト膜を形成して、ゼオライト成形体と鋳型剤を含有するゼオライト積層複合体の製造方法のところで説明する。

また、シリカゾルに、テトラプロピルアンモニウムヒドロキシド(TPAOH)溶液を、これらのテトラプロピルアンモニウムイオン(TPA)とシリカゾルとの配合割合(TPA/SiO_2)が所定のモル比となるように添加し、得られた調製液を噴霧して乾燥し、得られた乾燥ゲルを成形、結晶化処理して、ゼオライト

成形体を得、得られたゼオライト成形体を調製液と同一又は類似の組成の溶液に 浸漬して、水熱合成して、ゼオライト成形体上に鋳型剤を含有するゼオライト膜 を形成して、ゼオライト成形体と鋳型剤を含有するゼオライト膜との積層体を形 成することを特徴とするものであってもよい。具体的には、第2の発明のゼオラ イト積層複合体の製造方法のところで説明する。

第2の発明のゼオライト積層複合体の製造方法は、シリカゾルに、テトラプロピルアンモニウムヒドロキシド(TPAOH)溶液及びテトラプロピルアンモニウムブロミド(TPABr)を、これらのテトラプロピルアンモニウムイオン(TPA)と前記シリカゾルとの配合割合(TPA/SiO2)が所定のモル比となるように、かつ、テトラプロピルアンモニウムイオン(TPA)の全量に対するテトラプロピルアンモニウムヒドロキシド(TPAOH)及びテトラプロピルアンモニウムブロミド(TPABr)のそれぞれの配合割合[TPAOH/(TPAOH+TPABr)]が、0~99モル%及び100~1モル%となるように調整して添加し、得られた調製液を混練して乾燥し、得られた乾燥ゲルを成形、結晶化処理して、ゼオライト成形体を得、得られたゼオライト成形体を調製液と同一又は類似の組成の溶液に浸漬して、水熱合成して、ゼオライト成形体上に鋳型剤を含有するゼオライト膜を形成して、ゼオライト成形体と鋳型剤を含有するゼオライト膜を形成とともに、この積層体を仮焼して鋳型剤を同時に除去することを特徴とする。

ここで、ゼオライト成形体の製造における、テトラプロピルアンモニウムイオン (TPA) とシリカゾルとの配合割合 $(TPA/SiO_2$ モル比)については、モル比 $0.015\sim0.08$ の範囲でゼオライト成形体の平均粒子径は変化せず、また、曲げ強度はゼオライト積層複合体を形成し得る基体として必要な 1.5M Pa以上を有することから、いずれの範囲で調整してもよい。第2の発明の実施例においては、曲げ強度が最大となる TPA/SiO_2 モル比 0.04 に調整した。

また、調製液の TPA/SiO_2 モル比、及び全量TPAに対するTPAOH、 TPABrのそれぞれの配合割合が所定量に保たれていれば、必要に応じpHを 調整するために、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム等のアルカリ源を加えても よい。

次に、調製液を乾燥させるために、調製液をテフロンビーカーに入れマグネティクスターラーで撹拌した後、所定温度に設定した恒温槽で加熱しながらテフロン棒を用いて手動で撹拌混練を継続して、水分を蒸発させて乾燥ゲルを得る。この時の撹拌混練は、加熱ニーダー等で実施してもよい。

次に、乾燥ゲルの成形は、金型一軸プレス成形(全圧1000kgf)で所定の形状に整えた後、さらに冷間静水圧成形を行って、乾燥ゲル成形体を得る。この時、冷間静水圧成形の圧力は、所望の乾燥ゲル成形体密度となるように700~7000kgf/cm²の範囲で調整することが好ましい。

次に、前述のようにして得た乾燥ゲル成形体を、成形体重量と同重量の蒸留水を入れたテフロン内筒付ステンレス製耐圧容器中に、水と接触しないようにテフロン板の上に配置し、180℃のオーブン中で10時間自生水蒸気圧下で反応させて、結晶化処理し、ゼオライト成形体を得る。この時の蒸留水の量は、使用する耐圧容器容積にて飽和水蒸気圧に達する量の最少量であり、それ以上であれば成形体と蒸留水との関係からの制約はない。また、反応温度及び時間については、130℃以上及び2時間以上で結晶化が進むことからそれ以上の温度及び時間であれば特に制約はない。

こうして得たゼオライト成形体上への、鋳型剤を含有するゼオライト膜の積層は、シリカゾルに、TPAOH溶液及びTPABr、並びに蒸留水を、所定のSiO2/TPAOH/TPABr/水のモル比となるように添加して、調整し、耐圧容器中に入れ、調製液にゼオライト成形体を浸漬し、100℃以上のオーブン中で1時間以上反応させ、ゼオライト成形体上に十分な厚さを有し、かつ、緻密な層からなる鋳型剤を含有するゼオライト膜を形成し、ゼオライト積層中間体を得、このゼオライト積層中間体を仮焼し、ゼオライト積層複合体を得る。第2の発明の実施例においては、180℃のオーブン中で18時間反応させて、ゼオライト成形体上に20μm以上の厚さで、かつ、緻密な層からなるゼオライト膜を形成させた。

なお、調製液のSiO₂/テトラプロピルアンモニウムイオン(TPA)/水のモル比が所定量に保たれていれば、必要に応じpHを調整するために、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム等のアルカリ源を加えてもよい。

また、ゼオライト膜の形成方法としては、第1の発明の場合と同様の方法を用いることができる。

また、第2の発明のゼオライト積層複合体の製造方法は、シリカゾルに、テトラプロピルアンモニウムヒドロキシド(TPAOH)溶液を、これらのテトラプロピルアンモニウムイオン(TPA)とシリカゾルとの配合割合(TPA/SiO2)が所定のモル比となるように調整して添加し、得られた調製液を噴霧して乾燥し、得られた乾燥ゲルを成形、結晶化処理して、ゼオライト成形体を得、得られたゼオライト成形体を調製液と同一又は類似の組成の溶液に浸漬して、水熱合成して、ゼオライト成形体上に鋳型剤を含有するゼオライト膜を形成して、ゼオライト成形体と鋳型剤を含有するゼオライト膜との積層体を形成するとともに、この積層体を仮焼して鋳型剤を同時に除去することを特徴とするものであってもよい。

なお、ゼオライト成形体の製造における、テトラプロピルアンモニウムイオン (TPA) とシリカゾルとの配合割合 $(TPA/SiO_2$ モル比)については、モル比 $0.015\sim0.08$ の範囲でゼオライト成形体の平均粒子径は変化せず、また、曲げ強度はゼオライト積層複合体を形成し得る基体として必要な 1.5 M Pa 以上を有することから、いずれの範囲で調整してもよい。第 2 の発明の実施例においては、曲げ強度が最大となる TPA/SiO_2 モル比 0.04 に調整した。

次に、調製液の乾燥には、スプレードライヤーを用いた。調製液は、加圧空気によって噴霧された後、乾燥空気が流通した乾燥チャンバ内で乾燥される。この時、乾燥チャンバ内に流通される空気は、噴霧口付近で予め180℃に加熱されているが、この温度は、乾燥チャンバの容積によっても変化するものであるから限定されるものではない。

次に、乾燥ゲルの成形は、金型一軸プレス成形(全圧1000kgf)で所定の形状に整えた後、さらに冷間静水圧成形を行って、乾燥ゲル成形体を得る。この時、冷間静水圧成形の圧力は、所望の乾燥ゲル成形体密度となるように700~7000kgf/ c m^2 の範囲で調整することが好ましい。

次に、前述のようにして得た乾燥ゲル成形体を、成形体重量と同重量の蒸留水 を入れたテフロン内筒付ステンレス製耐圧容器中に、水と接触しないようにテフ ロン板の上に配置し、180℃のオーブン中で10時間自生水蒸気圧下で反応させて、結晶化処理し、ゼオライト成形体を得る。この時の蒸留水の量は、使用する耐圧容器容積にて飽和水蒸気圧に達する量の最少量であり、それ以上であれば成形体と蒸留水との関係からの制約はない。また、反応温度及び時間については、130℃以上及び2時間以上で結晶化が進むことからそれ以上の温度及び時間であれば特に制約はない。

こうして得たゼオライト成形体上への、鋳型剤を含有するゼオライト膜の積層は、シリカゾルに、TPAOH溶液及びTPABr、並びに蒸留水を、所定のSiO2/TPAOH/TPABr/水のモル比となるように添加して、調整し、耐圧容器中に入れ、調製液にゼオライト成形体を浸漬し、100℃以上のオーブン中で1時間以上反応させ、ゼオライト成形体上に十分な厚さを有し、かつ、緻密な層からなる鋳型剤を含有するゼオライト膜を形成し、ゼオライト積層中間体を得、このゼオライト積層中間体を仮焼し、ゼオライト積層複合体を得る。第2の発明の実施例においては、180℃のオーブン中で18時間反応させて、ゼオライト成形体上に20μm以上の厚さで、かつ、緻密な層からなるゼオライト膜を形成させた。

なお、調製液の SiO_2 /テトラプロピルアンモニウムイオン(TPA)/水のモル比が所定量に保たれていれば、必要に応じpHを調整するために、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム等のアルカリ源を加えてもよい。

また、ゼオライト膜の形成方法としては、第1の発明と同様の方法を用いることができる。

本発明のゼオライト成形体は、ゼオライトからなる粒子から構成された多孔質のゼオライト成形体であって、成形体の破断面の微構造観察において、前記ゼオライト成形体を構成する粒子のうち粒界破壊することにより個々の粒子が明瞭に観察される部分(健全部)の面積が、全破断面積の70%以上を占有することを特徴とする(以下、この発明を「第3の発明」ということがある)。

第3の発明に用いられるゼオライト、またゼオライト膜を形成するときに鋳型 剤を必要とする場合、その鋳型剤としては、第1の発明及び第2の発明の場合と 同じものを用いることができる。 第3の発明のゼオライト成形体は、成形体の破断面の微構造観察において、ゼオライト成形体を構成する粒子のうち粒界破壊することにより個々の粒子が明瞭に観察される部分(健全部)の面積が、全破断面積の70%以上を占有することを特徴とするものである。

このように、第3の発明のゼオライト成形体は、破断面の微構造における健全部の面積が全破断面積の70%以上を占有するものであることから、破断面の微構造において脱粒や粗密部分の発生が少なく均質なものとなり、圧力損失の減少及び機械的強度の維持向上のいずれをも満足するものとなる。

なお、第3の発明において、上記破断面の微構造における均質さの程度(均質度)は、ゼオライト成形体の破断面の微構造を走査型電子顕微鏡(SEM)によって観察し、画像解析装置により、健全部の面積が全破断面積に占める割合を算出することによって求めた。

すなわち、第3の発明のゼオライト成形体の破断面を走査型電子顕微鏡(SEM)により観察し、微構造全体の様子がわかるようにゼオライト粒子径が $1 \mu m$ 程度のものは倍率1500倍以下、粒径が $8 \mu m$ 程度のものは倍率5006以下で、それぞれSEM写真を撮った(第33図)。このSEM写真をベースに白黒に色分けしたレプリカ図を作製した(第34図)。

この場合、白の部分は健全部(粒界破壊することにより個々の粒子が明瞭に観察される部分)、黒の部分は緻密部(粒内破壊することにより個々の粒子が明瞭に観察されない部分)を示す。画像解析は、装置として、画像分析装置(東洋紡績(株)製 商品名:イメージアナライザーV10)を用い、レプリカ図の画像をパソコンに取り込み、測定領域、スケール、及び二値化処理(レプリカ図の白の部分を健全部、黒の部分を緻密部の非測定部分として認識させる処理)を設定し、健全部の面積が全破断面積に占める割合を算出した。

また、曲げ強度は、JIS R 1601に準拠して測定した。

さらに、圧力損失は、第2の発明の場合と同様にして測定した。

第3の発明のゼオライト成形体は、破断面の微構造における健全部の面積が全 破断面積の70%以上を占有するものであることが好ましく、90%以上がさら に好ましく、曲げ強度は1.5 MP a 以上が好ましく、6.0 MP a 以上がさらに好ましく、かつ、その肉厚を1.8 mmとしたときの、ヘリウムガス透過量1 $0 \, \mathrm{ml} / \mathrm{cm}^2 \cdot \mathrm{min}$ における供給側圧力と透過側圧力との差(圧力損失)が好ましくは、1.0気圧以下、0.6気圧以下がさらに好ましい。

第3の発明のゼオライト成形体の製造方法は、シリカゾルに、テトラプロピルアンモニウムヒドロキシド(TPAOH)溶液を、テトラプロピルアンモニウムイオン(TPA)とシリカゾルとの配合割合(TPA/SiO₂)がモル比で0.015~0.08、好ましくは、0.02~0.06となるように添加し、得られた調製液を混練して乾燥し、得られた乾燥ゲルを湿式粉砕し、得られたスラリーを噴霧して、乾燥し、得られた乾燥ゲル造粒物を成形、結晶化処理することを特徴とする。

ここで、スラリーを噴霧して乾燥する方法としては、例えば、スプレードライヤー、流動造粒乾燥機等の溶液やスラリーの噴霧乾燥機を挙げることができる。 第3の発明の実施例におけるスラリーの乾燥には、スプレードライヤーを用いた。 スラリーは、送液ポンプにより噴霧ノズル先端まで運ばれ、そこで加圧空気によって噴霧された後、乾燥空気が流通した乾燥チャンバ内で乾燥されて回収される。 この時、乾燥チャンバ内に流通される空気は、スラリーと加圧空気の噴霧口付近で予め180℃に加熱されているが、この温度は、乾燥チャンバの容積によっても変化するものであるから特に限定されるものではない。

また、スプレードライヤーによるスラリーの噴霧乾燥は、加圧成形に適したセラミックス微粉末の造粒方法として知られており、瞬間的な加熱乾燥によって造粒されるもであるから、原料組成に影響されることはない。従って、シリカゾルとテトラプロピルアンモニウムイオン (TPA) とが配合された原料であっても、前述の配合割合 $(TPA/SiO_2$ モル比)が所定の組成であればTPA原料によらず、噴霧、乾燥して、結晶化処理することによりゼオライト成形体を得ることができる。

具体的には、まず、シリカゾルとテトラプロピルアンモニウムヒドロキシド(TPAOH)溶液を混合する。この時、テトラプロピルアンモニウムイオン(TP

A)とシリカゾルとの配合割合(TPA/SiO₂モル比)については、モル比 0.0 1 5~0.0 8の範囲ではゼオライト成形体の平均粒子径は変化することがなく、また、曲げ強度については、ゼオライト積層複合体を形成し得る基体として必要な 1.5 MPa以上(ゼオライト膜の水熱合成環境下で破壊せず、かつ、膜を形成した後も破壊しない強度)を保持することから、前述のモル比のいずれの範囲で調整してもよい。また、添加するテトラプロピルアンモニウムイオン(TPA)の原料は、テトラプロピルアンモニウムヒドロキシド(TPAOH)溶液であってもテトラプロピルアンモニウムブロミド(TPABr)であってもよく、又はそれらの 2 原料を混合したものであってもよい。また、前記調製液のTPA/SiO₂モル比が所定量に保たれていれば、必要に応じ pHを調整するために、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム等のアルカリ源を加えてもよい。

なお、第3の発明の実施例においては、 TPA/SiO_2 モル比として曲げ強度が最大となるO. O4を用い、テトラプロピルアンモニウムイオン(TPA)源として、テトラプロピルアンモニウムヒドロキシド(TPAOH)溶液を用いて調製した。

次に、調製液を一旦乾燥させるために、調製液をテフロンビーカーに入れマグネティクスターラーで撹拌した後、所定の温度に設定した恒温槽で加熱しながらテフロン棒を用いて手動で撹拌混練を継続して、水分を蒸発させて乾燥ゲルを得る。この時の撹拌混練は、加熱ニーダー等で行ってもよい。

次に、乾燥ゲルのスラリーを調製するため、テフロン容器に撹拌混練により得た乾燥ゲルと蒸留水及び粉砕用玉石とを入れ、ボールミル湿式粉砕を行った。この時、ボールミル湿式粉砕以外でも、例えば、乾燥ゲルを媒体撹拌粉砕機(アトライター)を用い微粉砕した後に、所定の蒸留水を加える方法等でスラリーを調製してもよい。

次に、スラリーを、前述のような噴霧方法で噴霧し、乾燥して、乾燥ゲル造粒 物を得る。

次に、乾燥ゲル造粒物の成形は、金型一軸プレス成形(全圧1000kgf) で所定の形状に整えた後、さらに冷間静水圧成形を行って、乾燥ゲル成形体を得 る。この時、冷間静水圧成形の圧力は、所望の乾燥ゲル成形体密度となるように $700\sim7000$ k g f / c m^2 の範囲で調整することが好ましい。

次に、前述のようにして得た乾燥ゲル成形体を、成形体重量と同重量の蒸留水を入れたテフロン内筒付ステンレス製耐圧容器中に、水と接触しないようにテフロン板の上に配置し、180℃のオーブン中で10時間自生水蒸気圧下で反応させて、結晶化処理し、ゼオライト成形体を得る。この時の蒸留水の量は、使用する耐圧容器容積にて飽和水蒸気圧に達する量の最少量であり、それ以上であれば成形体と蒸留水との関係からの制約はない。また、反応温度及び時間については、130℃以上及び2時間以上で結晶化が進むことからそれ以上の温度及び時間であれば特に制約はない。

また、第3の発明のゼオライト成形体の製造方法は、シリカゾルに、テトラプロピルアンモニウムヒドロキシド(TPAOH)溶液を、テトラプロピルアンモニウムイオン(TPA)とシリカゾルとの配合割合(TPA/SiO_2)がモル比で0.015~0.08となるように添加し、得られた調製液を噴霧して、乾燥し、得られた乾燥ゲルを成形、結晶化処理することを特徴とするものであってもよい。

具体的には、まず、シリカゾルとテトラプロピルアンモニウムヒドロキシド(TPAOH)溶液を混合する。この時、テトラプロピルアンモニウムイオン(TPA)とシリカゾルとの配合割合(TPA/SiO2モル比)については、モル比 0.015~0.08、好ましくは、0.02~0.06の範囲ではゼオライト成形体の平均粒子径は変化することがなく、また、ゼオライト積層複合体を形成し得る基体として必要な 1.5 MPa以上の曲げ強度を保持することから、前述のモル比のいずれの範囲で調整してもよい。また、添加するテトラプロピルアンモニウムイオン(TPA)の原料は、テトラプロピルアンモニウムヒドロキシド(TPAOH)溶液でもテトラプロピルアンモニウムブロミド(TPABr)でもよく、又はそれらの 2 原料を混合したものであってもよい。また、前述の調製液のTPA/SiO2モル比が所定量に保たれていれば、必要に応じ pHを調整するために、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム等のアルカリ源を加えてもよい。

なお、第3の発明の実施例においては、 TPA/SiO_2 モル比として曲げ強度が最大となる0.04を用い、テトラプロピルアンモニウムイオン(TPA)源として、テトラプロピルアンモニウムヒドロキシド(TPAOH)溶液を用いて調製した。

次に、前記調製液を、前述のような噴霧方法で噴霧し、乾燥して、乾燥ゲルを 得る。

次に、乾燥ゲルの成形は、金型一軸プレス成形(全圧1000kgf)で所定の形状に整えた後、さらに冷間静水圧成形を行って、乾燥ゲル成形体を得る。この時、冷間静水圧成形の圧力は、所望の乾燥ゲル成形体密度となるように700 \sim 7000kgf/cm²の範囲で調整することが好ましい。

次に、前述のようにして得た乾燥ゲル成形体を、成形体重量と同重量の蒸留水を入れたテフロン内筒付ステンレス製耐圧容器中に、水と接触しないようにテフロン板の上に配置し、180℃のオーブン中で10時間自生水蒸気圧下で反応させて、結晶化処理し、ゼオライト成形体を得る。この時の蒸留水の量は、使用する耐圧容器容積にて飽和水蒸気圧に達する量の最少量であり、それ以上であれば成形体と蒸留水との関係からの制約はない。また、反応温度及び時間については、130℃以上及び2時間以上で結晶化が進むことからそれ以上の温度及び時間であれば特に制約はない。

このように、噴霧して乾燥する方法は、従来の混練して乾燥する方法よりも、 乾燥を均質にし、結晶化処理後の微構造を、粗密化及び脱粒から有効に防止する ことができる。

第3の発明のゼオライト積層中間体は、前述のゼオライト成形体上に同一又は類似の組成の鋳型剤を含有するゼオライト膜が積層されてなることを特徴とする。

鋳型剤を含有するゼオライト膜の形成方法としては特に制限はないが、例えば、 水熱合成法、気相輸送法等を挙げることができる。

また、第3の発明のゼオライト積層複合体は、前述のゼオライト積層中間体を 仮焼してゼオライト成形体及び鋳型剤を含有するゼオライト膜から鋳型剤を除去 することにより形成された、ゼオライト成形体上にゼオライト膜が積層されてな ることを特徴とする。

ここで、前述のゼオライト積層複合体は、分子ふるい膜等のガス分離膜や浸透 気化膜等に有効に用いられるものであるから、ゼオライト成形体上に積層される 鋳型剤を含有するゼオライト膜や鋳型剤が除去されたゼオライト膜は、ゼオライト成形体が露出することのないよう十分な厚さを必要とし、かつ、緻密な膜であることが必要である。また、ゼオライト成形体として鋳型剤を含有するものを用いる場合は、積層される鋳型剤を含有するゼオライト膜は、同じ鋳型剤を含有することを含め同一又は類似組成のゼオライトから構成されたものであることが必要である。

第3の発明のゼオライト積層中間体の製造方法は、シリカゾルに、テトラプロピルアンモニウムヒドロキシド(TPAOH)溶液を、テトラプロピルアンモニウムイオン(TPA)と前記シリカゾルとの配合割合(TPA/SiO_2)がモル比で $0.015\sim0.08$ となるように添加し、得られた調製液を混練して乾燥し、得られた乾燥ゲルを湿式粉砕し、得られたスラリーを噴霧、乾燥し、得られた乾燥ゲル造粒物を成形、結晶化処理して、ゼオライト成形体を得、得られたゼオライト成形体を調製液と同一又は類似の組成の溶液に浸漬し、水熱合成して、ゼオライト成形体上に鋳型剤を含有するゼオライト膜を形成して、ゼオライト成形体上に鋳型剤を含有するゼオライト膜との積層体を形成することを特徴とする。具体的には、第3の発明のゼオライト積層複合体の製造方法のところで説明する。

また、シリカゾルに、テトラプロピルアンモニウムヒドロキシド(TPAOH)溶液を、テトラプロピルアンモニウムイオン(TPA)とシリカゾルとの配合割合(TPA/SiO_2)がモル比で $0.015\sim0.08$ となるように添加し、得られた調製液を噴霧して、乾燥し、得られた乾燥ゲルを成形、結晶化処理して、ゼオライト成形体を得、得られたゼオライト成形体を調製液と同一又は類似の組成の溶液に浸漬し、水熱合成して、ゼオライト成形体上に鋳型剤を含有するゼオライト膜を形成して、ゼオライト成形体と鋳型剤を含有するゼオライト膜との積層体を形成することを特徴とするものであってもよい。第3の発明のゼオライト積層複合体の製造方法のところで説明する。

第3の発明のゼオライト積層複合体の製造方法は、シリカゾルに、テトラプロピルアンモニウムヒドロキシド(TPAOH)溶液を、テトラプロピルアンモニウムイオン(TPA)とシリカゾルとの配合割合(TPA/SiO₂)がモル比で0.015~0.08となるように添加し、得られた調製液を混練して乾燥し、得られた乾燥ゲルを湿式粉砕し、得られたスラリーを噴霧、乾燥し、得られた乾燥ゲル造粒物を成形、結晶化処理して、ゼオライト成形体を得、得られたゼオライト成形体を調製液と同一又は類似の組成の溶液に浸漬し、水熱合成して、ゼオライト成形体上に鋳型剤を含有するゼオライト膜を形成して、ゼオライト成形体と鋳型剤を含有するゼオライト膜との積層体を形成するとともに、この積層体を仮焼して鋳型剤を同時に除去することを特徴とする。

具体的には、まず、シリカゾルとテトラプロピルアンモニウムヒドロキシド(T PAOH)溶液を混合する。この時、テトラプロピルアンモニウムイオン(TP A)とシリカゾルとの配合割合(TPA/SiO2モル比)については、モル比 0.015~0.08、好ましくは、0.02~0.06の範囲ではゼオライト成形体の平均粒子径は変化することがなく、また、ゼオライト積層複合体を形成し得る基体として必要な曲げ強度は 1.5 MPa以上を保持することから、前述のモル比のいずれの範囲で調整してもよい。また、添加するテトラプロピルアンモニウムイオン(TPA)の原料は、テトラプロピルアンモニウムヒドロキシド(TPAOH)溶液でもテトラプロピルアンモニウムブロミド(TPABr)でもよく、又はそれらの 2 原料を混合したものであってもよい。また、調製液のTPA/SiO2モル比が所定量に保たれていれば、必要に応じpHを調整するために、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム等のアルカリ源を加えてもよい。

なお、第3の発明の実施例においては、 TPA/SiO_2 モル比として曲げ強度 が最大となる $O.O_4$ を用い、テトラプロピルアンモニウムイオン(TPA)源 として、テトラプロピルアンモニウムヒドロキシド(TPAOH)溶液を用いて 調製した。

次に、調製液を一旦乾燥させるために、調製液をテフロンビーカーに入れマグネティクスターラーで撹拌した後、所定の温度に設定した恒温槽で加熱しながら

テフロン棒で手動で撹拌混練を継続して、水分を蒸発させて乾燥ゲルを得る。この時の撹拌混練は、加熱ニーダー等で実施してもよい。

次に、乾燥ゲルのスラリーを調製するため、テフロン容器に撹拌混練により得た乾燥ゲルと蒸留水及び粉砕用玉石を入れ、ボールミル湿式粉砕を行った。この時、ボールミル湿式粉砕以外でも、例えば、乾燥ゲルを媒体撹拌粉砕機(アトライター)を用い微粉砕した後に、所定の蒸留水を加える方法等でスラリーを調製してもよい。

次に、スラリーを、前述のような噴霧方法で噴霧し、乾燥して、乾燥ゲル造粒 物を得る。

次に、乾燥ゲル造粒物の成形は、金型一軸プレス成形(全圧1000kgf)で所定の形状に整えた後、さらに冷間静水圧成形を行って、乾燥ゲル成形体を得る。この時、冷間静水圧成形の圧力は、所望の乾燥ゲル成形体密度となるように700~7000kgf/cm²の範囲で調整することが好ましい。

次に、前述のようにして得た乾燥ゲル成形体を、成形体重量と同重量の蒸留水を入れたテフロン内筒付ステンレス製耐圧容器中に、水と接触しないようにテフロン板の上に配置し、180℃のオーブン中で10時間自生水蒸気圧下で反応させて、結晶化処理し、ゼオライト成形体を得る。この時の蒸留水の量は、使用する耐圧容器容積にて飽和水蒸気圧に達する量の最少量であり、それ以上であれば成形体と蒸留水との関係からの制約はない。また、反応温度及び時間については、130℃以上及び2時間以上で結晶化が進むことからそれ以上の温度及び時間であれば特に制約はない。

こうして得たゼオライト成形体上へのゼオライト膜の積層は以下のようにする。シリカゾルに、TPAOH溶液及びTPABr、並びに蒸留水を、所定のSiO2/TPAOH/TPABr/水のモル比となるように添加して、調整し、耐圧容器中に入れ、調製液にゼオライト成形体を浸漬し、100℃以上のオーブン中で1時間以上反応させ、ゼオライト成形体上に十分な厚さを有し、かつ、緻密な層からなる鋳型剤を含有するゼオライト膜を形成し、ゼオライト積層中間体を得、このゼオライト積層中間体を仮焼し、ゼオライト積層複合体を得る。第3の発明

の実施例においては、180℃のオーブン中で18時間反応させて、ゼオライト 成形体上に20μm以上の厚さで、かつ、緻密な層からなるゼオライト膜を形成 させた。

なお、調製液のSiO₂/テトラプロピルアンモニウムイオン(TPA)/水のモル比が所定量に保たれていれば、必要に応じpHを調整するために、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム等のアルカリ源を加えてもよい。

また、第3の発明のゼオライト積層複合体の製造方法は、シリカゾルに、テトラプロピルアンモニウムヒドロキシド(TPAOH)溶液を、テトラプロピルアンモニウムイオン(TPA)とシリカゾルとの配合割合(TPA/SiO₂)がモル比で0.015~0.08、好ましくは、0.02~0.06となるように添加し、得られた調製液を噴霧して、乾燥し、得られた乾燥ゲルを成形、結晶化処理して、ゼオライト成形体を得、得られたゼオライト成形体を調製液と同一又は類似の組成の溶液に浸漬し、水熱合成して、ゼオライト成形体上に鋳型剤を含有するゼオライト膜を積層して、ゼオライト成形体と鋳型剤を含有するゼオライト膜との積層体を形成するとともに、この積層体を仮焼して鋳型剤を同時に除去することを特徴とするものであってもよい。

具体的には、まず、シリカゾルとテトラプロピルアンモニウムヒドロキシド(T PAOH)溶液を混合する。この時、テトラプロピルアンモニウムイオン(TP A)とシリカゾルとの配合割合(TPA/SiO2モル比)については、モル比 0. $015\sim0.08$ の範囲ではゼオライト成形体の平均粒子径は変化することがなく、また、ゼオライト積層複合体を形成し得る基体として必要な 1.5 MPa以上の曲げ強度を保持することから、モル比のいずれの範囲で調整してもよい。また、添加するテトラプロピルアンモニウムイオン(TPA)の原料は、テトラプロピルアンモニウムヒドロキシド(TPAOH)溶液でもテトラプロピルアンモニウムブロミド(TPABr)でもよく、又はそれらの 2 原料を混合したものであってもよい。また、調製液のTPA/SiO2モル比が所定量に保たれていれば、必要に応じpHを調整するために、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム等のアルカリ源を加えてもよい。

なお、第3の発明の実施例においては、 TPA/SiO_2 モル比として曲げ強度が最大となる0.04を用い、テトラプロピルアンモニウムイオン(TPA)源として、テトラプロピルアンモニウムヒドロキシド(TPAOH)溶液を用いて調製した。

次に、調製液を、前述のような噴霧方法で噴霧し、乾燥して、乾燥ゲルを得る。 次に、乾燥ゲルの成形は、金型一軸プレス成形(全圧1000kgf)で所定 の形状に整えた後、さらに冷間静水圧成形を行って、乾燥ゲル成形体を得る。こ の時、冷間静水圧成形の圧力は、所望の乾燥ゲル成形体密度となるように700 ~7000kgf/cm²の範囲で調整することが好ましい。

次に、前述のようにして得た乾燥ゲル成形体を、成形体重量と同重量の蒸留水を入れたテフロン内筒付ステンレス製耐圧容器中に、水と接触しないようにテフロン板の上に配置し、180℃のオーブン中で10時間自生水蒸気圧下で反応させて、結晶化処理し、ゼオライト成形体を得る。この時の蒸留水の量は、使用する耐圧容器容積にて飽和水蒸気圧に達する量の最少量であり、それ以上であれば成形体と蒸留水との関係からの制約はない。また、反応温度及び時間については、130℃以上及び2時間以上で結晶化が進むことからそれ以上の温度及び時間であれば特に制約はない。

こうして得たゼオライト成形体上へのゼオライト膜の積層は以下のようにする。シリカゾルに、TPAOH溶液及びTPABr、並びに蒸留水を、所定のSiО₂ /TPAOH/TPABr/水のモル比となるように添加して、調整し、耐圧容器中に入れ、調製液にゼオライト成形体を浸漬し、100℃以上のオーブン中で1時間以上反応させ、ゼオライト成形体上に十分な厚さを有し、かつ、緻密な層からなる鋳型剤を含有するゼオライト膜を形成し、ゼオライト積層中間体を得、このゼオライト積層中間体を仮焼し、ゼオライト積層複合体を得る。第3の発明の実施例においては、180℃のオーブン中で18時間反応させて、ゼオライト成形体上に20μm以上の厚さで、かつ、緻密な層からなるゼオライト膜を形成させた。

なお、前記調製液のSiO₂/テトラプロピルアンモニウムイオン (TPA)/

水のモル比が所定量に保たれていれば、必要に応じpHを調整するために、水酸 化ナトリウム、水酸化カリウム等のアルカリ源を加えてもよい。

なお、ゼオライト膜の形成方法としては、第1の発明及び第2の発明の場合と 同様の方法を用いることができる。

以下、本発明を実施例によりさらに具体的に説明するが、本発明はこれらの実 施例によっていかなる制限を受けるものではない。

実施例1~5、比較例1~7:第1の発明(1)

200mlテフロンビーカーに、約30質量%シリカゾル(日産化学(株)製、スノーテックスS)と10%テトラプロピルアンモニウムヒドロキシド溶液(和光純薬工業(株)製)を加え、TPA(テトラプロピルアンモニウムイオン)と SiO_2 との配合割合(TPA/SiO_2)がモル比でが表1に示すようにそれぞれ調整し、室温で30分間マグネティックスターラーで攪拌した後、さらに80℃に加熱しながら攪拌混練を継続し、水を蒸発させることにより、水分量が10質量%以下である無色の乾燥ゲルをそれぞれ得た。得られた乾燥ゲルをX線回折で結晶構造を調べたところ、非晶質であった。

得られた乾燥ゲルを、メノウ乳鉢にて粉砕し、目開き 355μ mメッシュを通過した粉末にした後、全圧1トンで金型一軸プレスを行うことにより、4 mm×4 mm×50 mmの棒状の成形体をそれぞれ得た。

得られた成形体を、成形体重量の半分量の蒸留水を入れたテフロン内筒付ステンレス製耐圧容器中に、水と接触しないようにテフロン板の上にセットし、180℃のオーブン中で18時間自生水蒸気圧下で反応させることにより、ゼオライト成形体をそれぞれ得た。

実施例1~5及び比較例1~7で得られたゼオライト成形体を、X線回折で結晶相を調べたところ、MFI型ゼオライトの多孔体であり、そのゼオライトがX線的に完全に結晶化していることがわかった。なお、比較例1で得られたものは、ゼオライトではなかった。

次に、実施例 $1\sim5$ 及び比較例 $1\sim7$ 得られたゼオライト成形体を、80℃で十分乾燥させた後、JIS R1601に従って4点曲げ強度を測定した。その

結果を表1に示す。

表 1

	TPA/SiO₂ (モル比)	4 点曲げ強度(MPa)
実施例1	0.015	3. 7
実施例2	0.020	13.6
実施例3	0.040	15.7
実施例4	0.060	8. 6
実施例5	0.080	5. 2
比較例1	0.000	-
比較例2	0.005	0. 5
比較例3	0.010	0. 6
比較例4	0.100	1. 4
比較例5	0.120	0. 9
比較例6	0.140	0. 4
比較例7	0.200	0. 2

表 1 から、実施例 $1 \sim 5$ のように、完全に結晶化したゼオライトからなるゼオライト成形体は、TPA(テトラプロピルアンモニウムイオン)と SiO_2 との配合割合(TPA/SiO_2)をモル比で $0.015\sim0.08$ に調整することにより、3MPa以上の強度が発現することがわかった。

実施例6~11、比較例8~10:第1の発明(2)

200mlテフロンビーカーに、約30質量%シリカゾル (日産化学 (株) 製、スノーテックスS) と10%テトラプロピルアンモニウムヒドロキシド溶液 (和 光純薬工業 (株) 製) を加え、TPA (テトラプロピルアンモニウムイオン) と S i O_2 との配合割合 (TPA/S i O_2) がモル比で表 2に示すようにそれぞれ

WO 01/64583 PCT/JP01/01562

調整し、室温で30分間マグネティックスターラーで攪拌した後、さらに80℃に加熱しながら攪拌混練を継続し、水を蒸発させることにより、水分量が10質量%以下である無色の乾燥ゲルをそれぞれ得た。得られた乾燥ゲルをX線回折で結晶構造を調べたところ、非晶質であった。

得られた乾燥ゲルを、メノウ乳鉢にて粉砕し、目開き 355μ mメッシュを通過した粉末にした後、全圧 1 トンで金型一軸プレスを行うことにより、 $4 mm \times 50$ mmの棒状の成形体をそれぞれ得た。

得られた成形体を、成形体重量の半分量の蒸留水を入れたテフロン内筒付ステンレス製耐圧容器中に、水と接触しないようにテフロン板の上にセットし、130℃のオーブン中で10時間自生水蒸気圧下で反応させることにより、ゼオライト成形体をそれぞれ得た。

実施例6~11及び比較例8~10で得られたゼオライト成形体を、X線回折で結晶相を調べたところ、比較例9~10で得られたものは、MFI型ゼオライトの多孔体であり、実施例6~11で得られたものは、MFI型ゼオライトと非晶質からなる結晶化途上のゼオライト多孔体であった。なお、比較例8で得られたものは、ゼオライトではなかった。

次に、実施例 $6\sim1$ 1 及び比較例 $8\sim1$ 0 で得られたゼオライト成形体を、 8 0 \mathbb{C} で十分乾燥させた後、 \mathbb{J} \mathbb{I} S R 1 6 0 1 に従って 4 点曲げ強度を測定した。 その結果を表 2 に示す。

表 2

	TPA/SiO ₂ (モル比)	4点曲げ強度(MPa)
実施例6	0.02	1. 8
実施例7	0.04	5. 7
実施例8	0.06	14.1
実施例 9	0.08	13.2
実施例10	0.10	4. 7
実施例11	0. 12	2. 3
比較例8	0.00	_
比較例9	0.14	1. 2
比較例10	0. 20	0. 2

表 2 から、実施例 6 ~ 1 1 のように、結晶化途上のゼオライトからなるゼオライト成形体は、TPA(テトラプロピルアンモニウムイオン)/S i O_2 のモル比を 0.0 2以上 0.1 2以下に調整することにより、1.5 MP a 以上の強度が発現することがわかった。

実施例12:第1の発明(3)

10%テトラプロピルアンモニウムヒドロキシド溶液(和光純薬工業(株)製) 15.26gとテトラプロピルアンモニウムブロミド(和光純薬工業(株)製) 2.00gを混合し、さらに蒸留水を49.85g、約30質量%シリカゾル(日産化学(株)製、スノーテックスS)6.00gを加えて、室温で30分間マグネティックスターラーで攪拌した成膜用のゾルを調製した。

このゾルを、テフロン内筒付ステンレス製100m1耐圧容器中に入れ、その中に実施例3で得られたゼオライト成形体を浸漬させ、180でのオーブン中で18時間反応させた。反応後の破断面を走査電子顕微鏡(SEM)で観察したところ、第1図の走査電子顕微鏡(SEM)写真に示すように、多孔質のゼオライト成形体上に約 17μ mの緻密層が形成されており、第2図に示す通り、X線回折からこの緻密膜がMFI型ゼオライトの膜であることが確認された。

以上のようにして得たゼオライト積層中間体を電気炉中500℃まで昇温し4時間保持してテトラプロピルアンモニウムを除去したところ、後述するローダミン試験でクラックが認められず、また、トリエチルベンゼンの浸透気化法でも分子の通過がなく、クラックのない緻密なゼオライト膜であることが確認された。実施例13:第1の発明(4)

実施例7で得られたゼオライト成形体を、実施例12におけると同様のゾルに浸漬し、テフロン内筒付ステンレス製100ml耐圧容器中に入れ、180℃のオーブン中で18時間反応させた。反応後の破断面をSEMで観察したところ、ゼオライト成形体上に実施例3におけると同様の緻密層が形成されており、X線回折からMFI型ゼオライトの膜であることが確認された。また、成膜前には非晶質であった成形体部分も、成膜処理によりMFI型ゼオライトに転化しており、ゼオライト成形体上にゼオライト膜が成膜されたゼオライト積層中間体を得た。

以上のようにして得たゼオライト積層中間体を電気炉中500℃まで昇温し4時間保持してテトラプロピルアンモニウムを除去したところ、表3に示すように、後述のローダミン試験でクラックが認められず、またトリイソプロピルベンゼン (TIPB)の浸透気化法でも分子の通過がなく、クラックのない緻密なゼオライト膜であることが確認された。

比較例11:第1の発明(5)

実施例12と同様に調製したゾルに多孔質アルミナを浸漬し、実施例12におけると同じ方法でゼオライト膜を形成した。

この膜を、電気炉中500℃まで昇温し4時間保持してテトラプロピルアンモニウムを除去したところ、表3に示すように、後述のローダミン試験でクラックが認められ、またトリイソプロピルベンゼンの浸透気化法でも分子が通過しており、気密膜ではなかった。

比較例12:第1の発明(6)

実施例12と同様に調製したゾルに多孔質窒化珪素を浸漬し、実施例12と同じ方法でゼオライト膜を形成した。

この膜を、電気炉中500℃まで昇温し4時間保持してテトラプロピルアンモニウムを除去したところ、表3に示すように、後述のローダミン試験でクラック

が認められ、またトリイソプロピルベンゼンの浸透気化法でも分子が通過しており、気密膜ではなかった。

比較例13:第1の発明(7)

実施例12と同様に調製したゾルに多孔質ムライトを浸漬し、実施例12と同じ方法でゼオライト膜を形成した。

この膜を、電気炉中500℃まで昇温し4時間保持してテトラプロピルアンモニウムを除去したところ、表3に示すように、後述のローダミン試験でクラックが認められ、またトリイソプロピルベンゼンの浸透気化法でも分子が通過しており、気密膜ではなかった。

比較例14:第1の発明(8)

実施例12と同様に調製したゾルに多孔質シリカガラスを浸漬し、実施例12 と同じ方法でゼオライト膜を形成した。

この膜を、電気炉中500℃まで昇温し4時間保持してテトラプロピルアンモニウムを除去したところ、表3に示すように、後述のローダミン試験でクラックが認められ、またトリイソプロピルベンゼンの浸透気化法でも分子が通過しており、気密膜ではなかった。

比較例15:第1の発明(9)

実施例12と同様に調製したゾルに多孔質コーディエライトを浸漬し、実施例12と同じ方法でゼオライト膜を形成した。

この膜を、電気炉中500℃まで昇温し4時間保持してテトラプロピルアンモニウムを除去したところ、表3に示すように、後述のローダミン試験でクラックが認められ、またトリイソプロピルベンゼンの浸透気化法でも分子が通過しており、気密膜ではなかった。

表3

	実施例12	実施例13	比較例11	比較例12	比較例13	比較例14	比較例15
クラック	無	無	有	有	有	有	有
TIPB 分 子	阻止	阻止	通過	通過	通過	通過	通過

実施例14~18:第2の発明(1)

200mlテフロンビーカーに、約30質量%シリカゾル(日産化学(株)製 商 品名:スノーテックスS)と、10%テトラプロピルアンモニウムヒドロキシド (TPAOH) 溶液(和光純薬工業(株)製)及びテトラプロピルアンモニウム ブロミド(TPABr)(和光純薬工業(株)製)とを、これらのテトラプロピル アンモニウムイオン(TPA)とシリカゾルとの配合割合(TPA/SiO。)が モル比で0.04となるように、かつ、テトラプロピルアンモニウムイオン(T PA) の全量に対するテトラプロピルアンモニウムヒドロキシド (TPAOH) 及びテトラプロピルアンモニウムブロミド(TPABr)のそれぞれの配合割合 [TPAOH/(TPAOH+TPABr)、及びTPABr/(TPAOH+T PABr)] がモル%で表4に示すものとなるよう調整して添加し、さらに、テト ラプロピルアンモニウムブロミド (TPABr) の添加量 (モル) と同量 (モル) の水酸化ナトリウムを約2質量%水酸化ナトリウム水溶液を用い添加して、室温 で30分間マグネティックスターラーで撹拌した後、さらに80℃に加熱しなが らテフロン棒を用いて手動で撹拌混練を継続し、水分を蒸発させることにより無 色の乾燥ゲルを得た。得られた乾燥ゲルをX線回折で結晶構造を調べたところ、 非晶質であった。

この乾燥ゲルをメノウ乳鉢にて粉砕し、目開き 355μ mメッシュを通過した粉末を、金型一軸プレス成形(全圧 1000 k g f)で $5\times4\times40$ mmの棒状及び直径 18 mm ϕ 、厚さ 1. 8 mmのディスク状にし、さらに冷間静水圧成形(1000 k g f / c m²)を行い、成形体を得た。この成形体を、成形体重量と同重量の蒸留水を入れたテフロン内筒付ステンレス製 100 m l 耐圧容器中に、

水と接触しないようにテフロン板の上に配置し、180℃のオーブン中で10時間自生水蒸気圧下で反応させた。反応後の成形体をX線回折で調べたところ、全ての組成でMFI型ゼオライトであった。この成形体を80℃で十分乾燥させ、ゼオライト成形体とした。

実施例14~18の走査型電子顕微鏡(SEM)写真を第4図~第8図にそれ ぞれ示す。

また、棒状のゼオライト成形体をJIS R 1601に準拠して四点曲げ強度を測定したところ、表4及び第9図に示すように、テトラプロピルアンモニウムイオン(TPA)の全量に対するテトラプロピルアンモニウムブロミド(TPA ABr)の配合割合 [TPABr/(TPAOH+TPABr)]が、5、12.5、25、37.5、50モル%と増加するに従い、曲げ強度が低下し、また、第10図に示すように、平均粒子径が増加すると曲げ強度が低下することがわかった。

また、ディスク状のゼオライト成形体の圧力損失を測定したところ、表4に示すように、テトラプロピルアンモニウムイオン(TPA)の全量に対するテトラプロピルアンモニウムブロミド(TPABr)の配合割合 [TPABr/ (TPAOH+TPABr)]が、5、12. 5、25、37. 5、50 モル%と増加するに従い、圧力損失が低下し、また、第11 図に示すように、平均粒子径が増加すると圧力損失が低下することがわかった。

実施例19:第2の発明(2)

200mlテフロンビーカーに、約30質量%シリカゾル(日産化学(株)製 商 品名:スノーテックスS) と、テトラプロピルアンモニウムブロミド(TPAB r) (和光純薬工業 (株) 製) とを、このTPAB r のテトラプロピルアンモニウムイオン (TPA) とシリカゾルとの配合割合 (TPA/S i O $_2$) がモル比で 0 . 0 4 となるように調整して添加し、さらに、テトラプロピルアンモニウムブロミド (TPAB r) の添加量 (モル) と同量 (モル) の水酸化ナトリウムを約2質量%水酸化ナトリウム水溶液を用い添加して、室温で 3 O分間マグネティックスターラーで撹拌した後、さらに 8 O $^{\circ}$ に加熱しながらテフロン棒を用いて手動で撹拌混練を継続し、水分を蒸発させることにより無色の乾燥ゲルを得た。得られた乾燥ゲルを X 線回折で結晶構造を調べたところ、非晶質であった。

この乾燥ゲルを、実施例14~18と同様にしてゼオライト成形体を得た。

このゼオライト成形体の破断面の微構造を、実施例14~18と同様にして走査型電子顕微鏡 (SEM) で観察し、その写真により、平均粒子径を算出したところ、平均粒子径は、24 μ mであった (第3図参照)。走査型電子顕微鏡 (SEM) 写真を第12図に示す。

また、棒状のゼオライト成形体の四点曲げ強度を実施例 $14 \sim 18$ と同様にして測定したところ、表 4、第 9 図及び第 10 図に示すように、2 M P a であった。また、表 4、第 11 図に示すように、ディスク状のゼオライト成形体の圧力損失を実施例 $14 \sim 18$ と同様にして測定したところ、 0.3×10^3 気圧であった。

実施例20:第2の発明(3)

200mlテフロンビーカーに、約30質量%シリカゾル(日産化学(株)製 商品名:スノーテックスS)と、10%テトラプロピルアンモニウムヒドロキシド (TPAOH) 溶液 (和光純薬工業(株)製)とを、このTPAOH溶液のテトラプロピルアンモニウムイオン (TPA)とシリカゾルとの配合割合 (TPA/SiO₂)がモル比で0.04となるように調整して添加し、室温で30分間マグネティックスターラーで撹拌して、スプレードライヤー用のテトラプロピルアンモニウムヒドロキシド (TPAOH)とシリカゾルとの混合溶液を調製した。この混合溶液をスプレードライヤー装置 (ヤマト科学(株)製 商品名:バルビスミニスプレーGA32型)で、噴霧空気圧1kgf/cm²、乾燥空気流量0.4m³/min、送液量3ml/min、吹きこみ温度180℃の条件で乾燥させ、

乾燥ゲルを得た。得られた乾燥ゲルを X線回折で結晶構造を調べたところ、非晶質であった。

この乾燥ゲルを、実施例14~18と同様にしてゼオライト成形体を得た。

この成形体の破断面の微構造を、実施例 $14\sim18$ と同様にして走査型電子顕微鏡 (SEM)で観察したところ、欠陥がなく、かつ粒子の粗密のない均質な構造であった。また、その写真により、平均粒子径を算出したところ、平均粒子径は、 7.5μ mであった。走査型電子顕微鏡 (SEM)写真を第13図に示す。

また、棒状のゼオライト成形体の四点曲げ強度を実施例 $14\sim18$ と同様にして測定したところ、表4に示すように、6 MP a であった。また、表4、第11 図に示すように、ディスク状のゼオライト成形体の圧力損失を実施例 $14\sim18$ と同様にして測定したところ、 0.6×10^3 気圧であった。

比較例16:第2の発明(4)

200mlテフロンビーカーに、約30質量%シリカゾル(日産化学(株)製 商品名:スノーテックスS)と、10%テトラプロピルアンモニウムヒドロキシド (TPAOH) 溶液 (和光純薬工業(株)製)とを、このTPAOH溶液のテトラプロピルアンモニウムイオン (TPA)とシリカゾルとの配合割合 (TPA/SiO₂)がモル比で0.04となるように調整して添加し、室温で30分間マグネティックスターラーで撹拌した後、さらに80℃に加熱しながらテフロン棒で手動で撹拌混練を継続し、水分を蒸発させることにより無色の乾燥ゲルを得た。得られた乾燥ゲルをX線回折で結晶構造を調べたところ、非晶質であった。

この乾燥ゲルを、実施例14~18と同様にしてゼオライト成形体を得た。

このゼオライト成形体の破断面の微構造を、実施例14~18と同様にして走査型電子顕微鏡 (SEM) で観察し、その写真により、平均粒子径を算出したところ、平均粒子径は、0.8 μ mであった (第3図参照)。走査型電子顕微鏡 (SEM) 写真を第14図に示す。

また、棒状のゼオライト成形体の四点曲げ強度を実施例14~18と同様にして測定したところ、表4、第9図及び第10図に示すように、26MPaであった。

また、第11図に示すように、ディスク状のゼオライト成形体の圧力損失を実

施例14~18と同様にして測定したところ、1.8気圧であった。

実施例14~20及び比較例16で得られたゼオライト成形体の破断面の微構造の平均粒子径(μm)、並びに実施例14~20及び比較例16で得られたゼオライト成形体の四点曲げ強度(MPa)及び圧力損失(atm)を測定した結果をまとめて表4に示す。表4から、実施例14~20で得られたゼオライト成形体は、比較例16で得られたゼオライト成形体に比べ、その平均粒子径及び四点曲げ強度も実用上十分に大きく、さらに、その圧力損失が極めて小さいことがわかる。従って、実施例14~20で得られたゼオライト成形体のような圧力損失が極めて小さい成形体(基体)の上にクラック等の欠陥のないゼオライト膜を積層、形成したゼオライト積層複合体を、分子ふるい膜等のガス分離膜や浸透気化膜として用いれば、ガス等の透過量の大きな、高機能なものとして使用することができることがわかる。

表 4

	全量TPAに対する配合割合(モル%)		乾燥ゲルの作製 方法	ゼオライト成形体		
	TPAOH	TPABr	80℃加熱、混 練、乾燥	粒子径 (μm)	四点曲げ強度 (M Pa)	圧力損失ΔP (気圧)
実施例 1 4	95.0	5. 0	同上	1. 5	2 7	0.9081
実施例 15	87.5	12.5	同上	2. 7	2 2	0.5652
実施例 16	75.0	25.0	同上	6. 4	1 3	0.0096
実施例 17	62.5	37.5	同上	8. 8	1 0	0.0025
実施例 18	50.0	50.0	同上	13.9	8	0.0010
実施例 19	_	100	同上	24.0	2	0.0003
実施例 20	1 0 0	-	溶液の噴霧、乾 燥	7. 5	6	0.0006
比較例 16	100	_	80℃加熱、混 練、乾燥	0. 8	2 6	1. 8

実施例21:第2の発明(5)

10%テトラプロピルアンモニウムヒドロキシド (TPAOH) 溶液 (和光純 薬工業 (株) 製) 15.26gとテトラプロピルアンモニウムブロミド (TPA Br) (和光純薬工業(株) 製) 2.00gを混合し、さらに蒸留水を49.85g、約30質量%シリカゾル(日産化学(株) 製 商品名:スノーテックスS) 6.00gを、これらのSiO $_2$ /TPAOH/TPABr/水のモル比が1/0.25/0.25/125となるように加え、室温で30分間マグネティックスターラーで撹拌してゼオライト膜の成膜用ゾルを調製した。

このゾルをテフロン内筒付ステンレス製100m1耐圧容器中に入れ、実施例19のゼオライト成形体を浸漬させ、180Cのオーブン中で18時間反応させた。反応後の断面を走査型電子顕微鏡(SEM)で観察したところ、第22図のSEM写真に示すように、ゼオライト成形体上に約 25μ mの緻密層が形成されており、X線回折からこの緻密膜がMFI型ゼオライト膜であることが確認された。

以上のようにして得たゼオライト積層中間体を電気炉中500℃まで昇温し4時間保持してテトラプロピルアンモニウム (TPA) を除去したところ、ローダミン試験でクラックが認められず、また、トリエチルベンゼンの浸透気化法でも分子の通過がなく、クラックのない緻密なゼオライト積層複合体であることが確認された。

実施例22:第2の発明(6)

実施例20のゼオライト成形体上に、実施例21と同様にしてゼオライト積層 中間体を得た。

以上のようにして得たゼオライト積層中間体を電気炉中500℃まで昇温し4時間保持してテトラプロピルアンモニウム(TPA)を除去したところ、ローダミン試験でクラックが認められず、また、トリエチルベンゼンの浸透気化法でも分子の通過がなく、クラックのない緻密なゼオライト積層複合体であることが確認された。

なお、熱膨張差によりゼオライト膜において生じるクラックは、8~50オングストローム程度の分子レベルのものであり、SEMでも検出することができない。そこで、本発明においては、上記クラックの測定方法として、下記の方法を用いた。

第1の方法(ローダミン試験)は、ゼオライト膜上にローダミンBを滴下して

クラックを可視化し、光学顕微鏡で観察する方法である。

第2の方法(浸透気化法)は、第15図に示すように、トリイソプロピルベンゼン(TIPB)分子20を真空ポンプ22により吸引し、ゼオライト膜21を通過させることにより、真空計23又はガスクロマトグラフでクラックの有無を確認する方法である。

実施例23:第3の発明(1)

200mlテフロンビーカーに、約30質量%シリカゾル(日産化学(株)製 商品名:スノーテックスS)と、10%テトラプロピルアンモニウムヒドロキシド (TPAOH)溶液(和光純薬工業(株)製)を、このTPAOH溶液のテトラプロピルアンモニウムイオン(TPA)とシリカゾルとの配合割合(TPA/SiO2)がモル比で0.04となるように調整して添加し、室温で30分間マグネティックスターラーで撹拌した後、さらに80℃に加熱しながらテフロン棒を用いて手動で撹拌混練を継続し、水分を蒸発させることにより無色の乾燥ゲルを得た。得られた乾燥ゲルをX線回折で結晶構造を調べたところ、非晶質であった。

この乾燥ゲル100gを500mlテフロン容器に取り、蒸留水100gと直径5mmのジルコニア玉石1200gを加え、ポットミル架台で24時間の湿式粉砕を行ってスラリーを得た。

第23図に示すように、このスラリーの粒度をレーザー回折式粒度分布測定装置(島津製作所(株)製 商品名:SALD-2000A)で調べたところ、10%体積粒子径が、0.5 μ m、50%体積粒子径が、0.9 μ m、90%体積粒子径が、1.8 μ mの分布であった。

スラリーを、目開き 1000μ mメッシュを通過させて、直径5mmのジルコニア玉石と分離して回収し、マグネティックスターラーで撹拌した。

このスラリーをスプレードライヤー装置(ヤマト科学(株)製 商品名: DLー41型)で、噴霧空気圧 1 k g f / c m^2 、乾燥空気流量 $0.8 \text{ m}^3/\text{m i n}$ 、送液量 2.5 m l / m i n、吹きこみ温度 1.80 ° の条件で乾燥させ、乾燥ゲル造 粒粉を得た。

第24図に示すように、得られた乾燥ゲル造粒粉を走査型電子顕微鏡 (SEM) で観察したところ、最大粒径は40μmであった。

このようにして得た乾燥ゲル造粒粉を、金型一軸プレス成形(全圧1000kgf)で $5\times4\times40mm$ の棒状及び直径 $18mm\phi$ 、厚さ1.8mmのディスク状にし、さらに冷間静水圧成形(全圧 $2500kgf/cm^2$)を行い、成形体を得た。

この成形体を、成形体重量と同重量の蒸留水を入れたテフロン内筒付ステンレス製100ml耐圧容器中に、水と接触しないようにテフロン板の上に配置し、180℃のオーブン中で10時間自生水蒸気圧下で反応させた。反応後の成形体をX線回折で調べたところ、MFI型ゼオライトであった。この成形体を80℃で十分乾燥させ、ゼオライト成形体とした。

このようにして得たゼオライト成形体の破断面の微構造を、走査型電子顕微鏡 (SEM)で観察し、その写真により、均質度を算出したところ、健全部の面積 が100%で、第25図及び第26図に示すように、粒子の脱粒がなく、かつ粒子の粗密のない均質なものであった。また、平均粒子径は、SEM写真から0.8μmであった。

また、棒状のゼオライト成形体をJIS R 1601に準拠して四点曲げ強度を測定したところ、曲げ強度は、25MPaであった。また、ディスク状のゼオライト成形体の圧力損失を測定したところ、0.18気圧であった。

実施例24:第3の発明(2)

200mlテフロンビーカーに、約30質量%シリカゾル(日産化学(株)製 商品名:スノーテックスS)と、10%テトラプロピルアンモニウムヒドロキシド (TPAOH) 溶液 (和光純薬工業 (株)製)とを、このTPAOH溶液のテトラプロピルアンモニウムイオン (TPA)とシリカゾルとの配合割合 (TPA/SiO₂)がモル比で0.04となるように調整して添加し、室温で30分間マグネティックスターラーで撹拌して、スプレードライヤー用のテトラプロピルアンモニウムヒドロキシド (TPAOH)とシリカゾルとの混合溶液を調製した。この混合溶液をスプレードライヤー装置(ヤマト科学(株)製 商品名:バルビスミニスプレーGA32型)で、噴霧空気圧1kgf/cm²、乾燥空気流量0.4m³/min、送液量3ml/min、吹きこみ温度180℃の条件で乾燥させ、乾燥ゲルを得た。得られた乾燥ゲルをX線回折で結晶構造を調べたところ、非晶

質であった。

第27図に示すように、この乾燥ゲルの微構造を、実施例23と同様にして走査型電子顕微鏡(SEM)で観察したところ、最大粒子径は、約 15μ mであった。

この乾燥ゲルを、金型一軸プレス成形(全圧 $1000 \, \mathrm{kg} \, \mathrm{f}$)で $5 \times 4 \times 40 \, \mathrm{mm}$ の棒状及び直径 $18 \, \mathrm{mm} \, \phi$ 、厚さ $1.8 \, \mathrm{mm}$ のディスク状にし、さらに冷間静水圧成形($1000 \, \mathrm{kg} \, \mathrm{f} \, / \, \mathrm{cm}^2$)を行い、成形体を得た。この成形体を実施例 $23 \, \mathrm{e}$ 同様にして $180 \, \mathrm{cm}$ のオーブン中で $10 \, \mathrm{e}$ 間自生水蒸気圧下で反応させ、ゼオライト成形体を得た。

このゼオライト成形体の破断面の微構造を、実施例23と同様にして走査型電子顕微鏡(SEM)で観察したところ、健全部の面積が100%で、第28図及び第29図に示すように、欠陥がなく、かつ粒子の粗密のない均質な構造であった。また、その写真により、平均粒子径を算出したところ、平均粒子径は7.5 μ mであった。

また、棒状のゼオライト成形体の四点曲げ強度を実施例23と同様にして測定したところ、6 MP a であった。また、ディスク状のゼオライト成形体の圧力損失を測定したところ、 0.6×10^3 気圧であった。

比較例17:第3の発明(3)

200mlテフロンビーカーに、約30質量%シリカゾル(日産化学(株)製 商品名:スノーテックスS)と、10%テトラプロピルアンモニウムヒドロキシド (TPAOH)溶液 (和光純薬工業(株)製)を、このTPAOH溶液のテトラプロピルアンモニウムイオン (TPA)とシリカゾルとの配合割合 (TPA/SiO2)がモル比で0.04となるように調整して添加し、室温で30分間マグネティックスターラーで撹拌した後、さらに80℃に加熱しながらテフロン棒を用いて手動で撹拌混練を継続し、水分を蒸発させることにより無色の乾燥ゲルを得た。得られた乾燥ゲルをX線回折で結晶構造を調べたところ、非晶質であった。

この乾燥ゲルをメノウ乳鉢で粉砕し、目開き 355μ mメッシュを通過させた。 第30図に示すように、粉砕後の乾燥ゲルの外表面の微構造をSEMで観察したところ、約 50μ mの角張った粒子が多く見られた。 このようにして得た乾燥ゲルを、金型一軸プレス成形(全圧1000kgf)で $5 \times 4 \times 4$ 0mmの棒状及び直径18mm ϕ 、厚さ1.8mmのディスク状にし、さらに冷間静水圧成形(1000kgf/cm²)を行い、成形体を得た。

この成形体を、成形体重量の同重量の蒸留水を入れたテフロン内筒付ステンレス製100ml耐圧容器中に、水と接触しないようにテフロン板の上に配置し、180℃のオーブン中で10時間自生水蒸気圧下で反応させた。反応後の成形体をX線回折で調べたところ、MFI型ゼオライトであった。この成形体を80℃で十分乾燥させ、ゼオライト成形体とした。

このようにして得たゼオライト成形体の破断面の微構造を、走査型電子顕微鏡 (SEM)で観察し、その写真により、均質度を算出したところ、健全部の面積 が62%で、第31図及び第32図に示すように、脱粒による欠陥の存在及び粒子が部分的に密になっている様子が観察された。また、平均粒子径は、SEM写真から0.8μmであることがわかった。

また、棒状のゼオライト成形体をJIS R 1601に準拠して四点曲げ強度を測定したところ、曲げ強度は、26MPaであった。また、ディスク状のゼオライト成形体の圧力損失を測定したところ、1.8気圧であった。

実施例23、24及び比較例17で得られたゼオライト成形体の破断面の微構造の均質度[健全部の面積(%)]及び平均粒子径(μm)、並びに実施例23、24及び比較例17で得られたゼオライト成形体の四点曲げ強度(MPa)及び圧力損失(atm)を測定した結果をまとめて表5に示す。

表5から、実施例23、24で得られたゼオライト成形体は、比較例17で得られたゼオライト成形体に比べ、健全部の面積が極めて大きい(欠陥がない)ことがわかる。また、その平均粒子径及び四点曲げ強度も実用上十分に大きく、さらに、その圧力損失が極めて小さいことがわかる。従って、実施例23、24で得られたゼオライト成形体のような圧力損失が極めて小さい成形体(基体)の上にクラック等の欠陥のないゼオライト膜を積層、形成したゼオライト積層複合体を、分子ふるい膜等のガス分離膜や浸透気化膜として用いれば、ガス等の透過量の大きな、高機能なものとして使用することができることがわかる。

表 5

	微構造の均質度 (健全部の面積 (%))	平均粒子径 (μm)	四点曲げ強度 (MPa)	圧力損失ΔP (atm)
実施例 23	100	0.8	2 5	0.18
実施例 24	100	7. 5	6	0.0006
比較例 17	6 2	0.8	2 6	1.80

実施例25:第3の発明(4)

10%テトラプロピルアンモニウムヒドロキシド (TPAOH) 溶液 (和光純薬工業 (株) 製) 15.26gとテトラプロピルアンモニウムブロミド (TPABr) (和光純薬工業 (株) 製) 2.00gを混合し、さらに蒸留水を49.85g、約30質量%シリカゾル (日産化学 (株) 製 商品名:スノーテックスS) 6.00gを、これらのSiO2/TPAOH/TPABr/水のモル比が1/0.25/0.25/125となるように加え、室温で30分間マグネティックスターラーで撹拌したゼオライト膜の成膜用ゾルを調製した。

このゾルをテフロン内筒付ステンレス製100m1耐圧容器中に入れ、実施例23で得られたゼオライト成形体を浸漬させ、180Cのオーブン中で18時間反応させた。反応後の破断面の微構造を走査型電子顕微鏡(SEM)で観察したところ、第35図のSEM写真に示すように、ゼオライト成形体上に約 25μ mの緻密層が形成されており、X線回折からこの緻密膜がMFI型ゼオライト膜であることが確認された。

以上のようにして得たゼオライト積層中間体を電気炉中500℃まで昇温し4時間保持してテトラプロピルアンモニウム (TPA) を除去したところ、ローダミン試験でクラックが認められず、また、トリエチルベンゼンの浸透気化法でも分子の通過がなく、クラックのない緻密なゼオライト積層複合体であることが確認された。

実施例26:第3の発明(5)

実施例24で得られたゼオライト成形体上に、実施例25と同様にしてゼオライト積層中間体を得た。

WO 01/64583 PCT/JP01/01562

52

以上のようにして得られたゼオライト積層中間体を電気炉中500℃まで昇温 し4時間保持してテトラプロピルアンモニウム(TPA)を除去したところ、ローダミン試験でクラックが認められず、また、トリエチルベンゼンの浸透気化法 でも分子の通過がなく、クラックのない緻密なゼオライト積層複合体であること が確認された。

産業上の利用可能性

以上説明したように、本発明によって、クラックを発生させることなくその上にゼオライト膜を形成かつ維持し得るとともに、分子ふるい膜等のガス分離膜や浸透気化膜として用いた場合、圧力損失の減少及び機械的強度の維持向上のいずれをも満足するゼオライト成形体、このゼオライト成形体上に鋳型剤を含有するゼオライト膜を形成したゼオライト積層中間体、このゼオライト積層中間体を仮焼して形成したゼオライト積層複合体及びそれらの製造方法を提供することができる。従って、本発明は、高分画能の分離膜や高性能の触媒担体が要求される分野及び耐熱性、耐薬品性が要求される分野(例えば、石油化学、水処理、薬品、食品分野等)において特に有効に用いられる。

請求の範囲

- 1. ゼオライトからなる多孔質のゼオライト成形体であって、
- テトラプロピルアンモニウムイオン(TPA)とシリカゾルとの配合割合(TPA)がモル比で0.015~0.08であり、かつ完全に結晶化したゼオライトからなることを特徴とするゼオライト成形体。
- 2. ゼオライトからなる多孔質のゼオライト成形体であって、
- テトラプロピルアンモニウムイオン(TPA)とシリカゾルとの配合割合(TPA)がモル比で0.02~0.12であり、かつ結晶化途上のゼオライトからなることを特徴とするゼオライト成形体。
- 3. 請求項1又は2に記載のゼオライト成形体が鋳型剤を含有するものであり、 その上に同一又は類似の組成の鋳型剤を含有するゼオライト膜が積層されてなる ことを特徴とするゼオライト積層中間体。
- 4. 請求項3に記載のゼオライト積層中間体を仮焼して前記ゼオライト成形体 及び前記鋳型剤を含有するゼオライト膜から前記鋳型剤を除去することにより形 成された、前記ゼオライト成形体上に前記ゼオライト膜が積層されてなることを 特徴とするゼオライト積層複合体。
- 5. テトラプロピルアンモニウムイオン(TPA)とシリカゾルとの配合割合(TPA/SiO₂)がモル比で0.015~0.08であり、かつ完全に結晶化したゼオライトからなるとともに、鋳型剤を含有するゼオライト成形体の上に、同一又は類似の組成のゼオライト膜を積層した後仮焼して、前記ゼオライト膜及び前記ゼオライト成形体から同時に鋳型剤を除去し、前記ゼオライト成形体上に前記ゼオライト膜を積層したゼオライト積層複合体を得ることを特徴とするゼオライト積層複合体の製造方法。
- 6. テトラプロピルアンモニウムイオン(TPA)とシリカゾルとの配合割合(TPA/SiO₂)がモル比で0.02~0.12であり、かつ結晶化途上のゼオライトからなるとともに、鋳型剤を含有するゼオライト成形体上に、同一又は類似の組成のゼオライト膜を積層した後仮焼して、前記ゼオライト膜及び前記ゼオライト成形体から同時に鋳型剤を除去し、前記ゼオライト成形体上に前記ゼオライト膜を積層したゼオライト積層複合体を得ることを特徴とするゼオライト積

層複合体の製造方法。

7. ゼオライトからなる多孔質のゼオライト成形体であって、

平均粒子径が 1. 0μ m以上、曲げ強度が 1. 5 MP a 以上、かつ、その肉厚を 1. 8 mm としたときの、ヘリウムガスの透過量 1 0 m l ℓ c ℓ c ℓ m i n における供給側圧力と透過側圧力との差が、 1. ℓ 0 気圧以下であることを特徴とするゼオライト成形体。

- 8. 請求項7に記載のゼオライト成形体が鋳型剤を含有するものであり、その上に同一又は類似の組成の鋳型剤を含有するゼオライト膜が積層されてなることを特徴とするゼオライト積層中間体。
- 9. 請求項8に記載のゼオライト積層中間体を仮焼して前記ゼオライト成形体及び前記鋳型剤を含有するゼオライト膜から前記鋳型剤を除去することにより形成された、前記ゼオライト成形体上に前記ゼオライト膜が積層されてなることを特徴とするゼオライト積層複合体。
- 10. シリカゾルに、テトラプロピルアンモニウムヒドロキシド(TPAOH) 溶液及びテトラプロピルアンモニウムブロミド(TPABr)を、これらのテトラプロピルアンモニウムイオン(TPA)の全量に対するテトラプロピルアンモニウムヒドロキシド(TPAOH)及びテトラプロピルアンモニウムブロミド(TPAOH/(TPAOH+TPABr)、及びTPABr)のそれぞれの配合割合 [TPAOH/(TPAOH+TPABr)、及びTPABr/(TPAOH+TPABr)]が、0~99モル%及び100~1モル%となるように調整して添加し、得られた調製液を混練して乾燥し、得られた乾燥ゲルを成形、結晶化処理することを特徴とするゼオライト成形体の製造方法。
- 11. シリカゾルに、テトラプロピルアンモニウムヒドロキシド (TPAOH) 溶液を添加し、得られた調製液を噴霧して、乾燥し、得られた乾燥ゲルを成形、結晶化処理することを特徴とするゼオライト成形体の製造方法。
- 12. シリカゾルに、テトラプロピルアンモニウムヒドロキシド (TPAOH) 溶液及びテトラプロピルアンモニウムブロミド (TPABr) を、これらのテトラプロピルアンモニウムイオン (TPA) の全量に対するテトラプロピルアンモニウムヒドロキシド (TPAOH) 及びテトラプロピルアンモニウムブロミド (T

PABr)のそれぞれの配合割合 [TPAOH/(TPAOH+TPABr)、及びTPABr/(TPAOH+TPABr)]が、0~99モル%及び100~1モル%となるように調整して添加し、得られた調製液を混練して乾燥し、得られた乾燥ゲルを成形、結晶化処理して、ゼオライト成形体を得、得られた前記ゼオライト成形体を前記調製液と同一又は類似の組成の溶液に浸漬して、水熱合成して、前記ゼオライト成形体上に鋳型剤を含有するゼオライト膜を形成して、前記ゼオライト成形体と前記鋳型剤を含有するゼオライト膜との積層体を形成することを特徴とするゼオライト積層中間体の製造方法。

- 13. シリカゾルに、テトラプロピルアンモニウムヒドロキシド (TPAOH) 溶液を添加し、得られた調製液を噴霧して乾燥し、得られた乾燥ゲルを成形、結晶化処理して、ゼオライト成形体を得、得られた前記ゼオライト成形体を前記調製液と同一又は類似の組成の溶液に浸漬して、水熱合成して、前記ゼオライト成形体上に鋳型剤を含有するゼオライト膜を形成して、前記ゼオライト成形体と前記鋳型剤を含有するゼオライト膜との積層体を形成することを特徴とするゼオライト積層中間体の製造方法。
- 14. シリカゾルに、テトラプロピルアンモニウムヒドロキシド(TPAOH)溶液及びテトラプロピルアンモニウムブロミド(TPABr)を、これらのテトラプロピルアンモニウムイオン(TPA)の全量に対するテトラプロピルアンモニウムヒドロキシド(TPAOH)及びテトラプロピルアンモニウムブロミド(TPABr)のそれぞれの配合割合[TPAOH/(TPAOH+TPABr)、及びTPABr/(TPAOH+TPABr)]が、0~99モル%及び100~1モル%となるように調整して添加し、得られた調製液を混練して乾燥し、得られた乾燥ゲルを成形、結晶化処理して、ゼオライト成形体を得、得られた前記ゼオライト成形体を前記調製液と同一又は類似の組成の溶液に浸漬して、水熱合成して、前記ゼオライト成形体上に鋳型剤を含有するゼオライト膜を形成して、前記ゼオライト成形体と前記鋳型剤を含有するゼオライト膜との積層体を形成するとともに、この積層体を仮焼して鋳型剤を同時に除去することを特徴とするゼオライト積層複合体の製造方法。
- 15. シリカゾルに、テトラプロピルアンモニウムヒドロキシド (TPAOH)

溶液を添加し、得られた調製液を噴霧して乾燥し、得られた乾燥ゲルを成形、結晶化処理して、ゼオライト成形体を得、得られた前記ゼオライト成形体を前記調製液と同一又は類似の組成の溶液に浸漬して、水熱合成して、前記ゼオライト成形体上に鋳型剤を含有するゼオライト膜を形成して、前記ゼオライト成形体と前記鋳型剤を含有するゼオライト膜との積層体を形成するとともに、この積層体を仮焼して鋳型剤を同時に除去することを特徴とするゼオライト積層複合体の製造方法。

16. ゼオライトからなる粒子から構成された多孔質のゼオライト成形体であって、

成形体の破断面の微構造観察において、前記ゼオライト成形体を構成する粒子のうち粒界破壊することにより個々の粒子が明瞭に観察される部分(健全部)の面積が、全破断面積の70%以上を占有することを特徴とするゼオライト成形体。

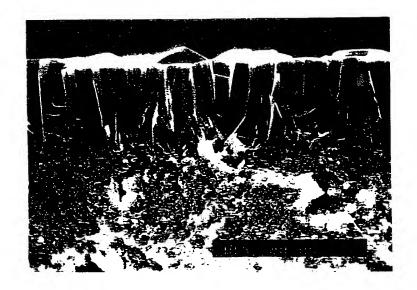
- 17. 請求項16に記載のゼオライト成形体が鋳型剤を含有するものであり、 その上に同一又は類似の組成の鋳型剤を含有するゼオライト膜が積層されてなる ことを特徴とするゼオライト積層中間体。
- 18. 請求項17に記載のゼオライト積層中間体を仮焼して前記ゼオライト成形体及び前記鋳型剤を含有するゼオライト膜から前記鋳型剤を除去することにより形成された、前記ゼオライト成形体上にゼオライト膜が積層されてなることを特徴とするゼオライト積層複合体。
- 19. シリカゾルに、テトラプロピルアンモニウムヒドロキシド(TPAOH) 溶液を、テトラプロピルアンモニウムイオン(TPA)と前記シリカゾルとの配合割合(TPA/SiO_2)がモル比で $0.015\sim0.08$ となるように添加し、得られた調製液を混練して乾燥し、得られた乾燥ゲルを湿式粉砕し、得られたスラリーを噴霧して、乾燥し、得られた乾燥ゲル造粒物を成形、結晶化処理することを特徴とするゼオライト成形体の製造方法。
- 20. シリカゾルに、テトラプロピルアンモニウムヒドロキシド(TPAOH) 溶液を、テトラプロピルアンモニウムイオン(TPA)と前記シリカゾルとの配合割合(TPA/SiO_2)がモル比で0.015~0.08となるように添加し、得られた調製液を噴霧して、乾燥し、得られた乾燥ゲルを成形、結晶化処理する

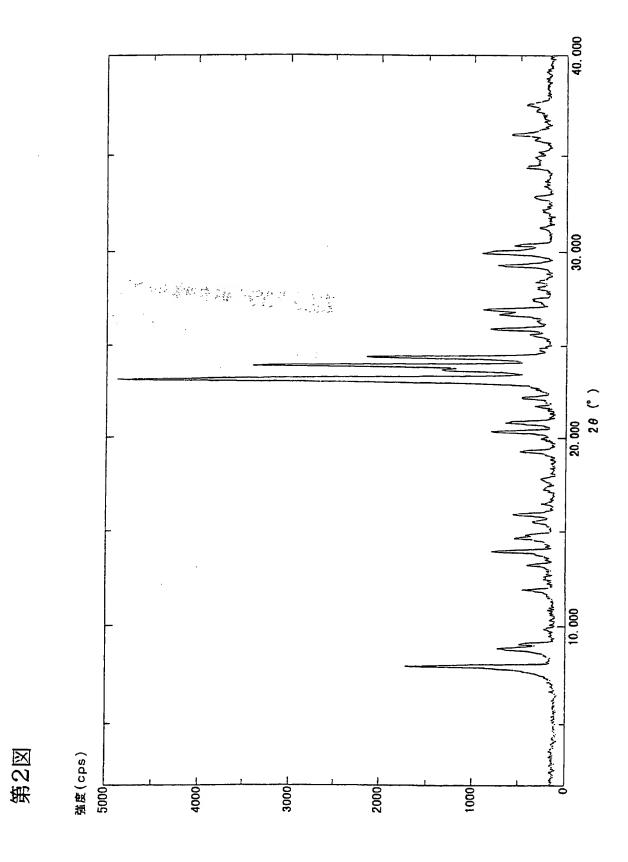
ことを特徴とするゼオライト成形体の製造方法。

- 21. シリカゾルに、テトラプロピルアンモニウムヒドロキシド (TPAOH) 溶液を、テトラプロピルアンモニウムイオン (TPA) と前記シリカゾルとの配合割合 (TPA/SiO_2) がモル比で $0.015\sim0.08$ となるように添加し、得られた調製液を混練して乾燥し、得られた乾燥ゲルを湿式粉砕し、得られたスラリーを噴霧、乾燥し、乾燥ゲル造粒物を成形、結晶化処理して、ゼオライト成形体を得、得られた前記ゼオライト成形体を前記調製液と同一又は類似の組成の溶液に浸漬し、水熱合成して、前記ゼオライト成形体上に鋳型剤を含有するゼオライト膜を形成して、前記ゼオライト成形体と前記鋳型剤を含有するゼオライト膜を形成して、前記ゼオライト成形体と前記鋳型剤を含有するゼオライト膜との積層体を形成することを特徴とするゼオライト積層中間体の製造方法。
- 22. シリカゾルに、テトラプロピルアンモニウムヒドロキシド(TPAOH)溶液を、テトラプロピルアンモニウムイオン(TPA)と前記シリカゾルとの配合割合(TPA/SiO_2)がモル比で $0.015\sim0.08$ となるように添加し、得られた調製液を噴霧して、乾燥し、得られた乾燥ゲルを成形、結晶化処理して、ゼオライト成形体を得、得られた前記ゼオライト成形体を前記調製液と同一又は類似の組成の溶液に浸漬し、水熱合成して、前記ゼオライト成形体上に鋳型剤を含有するゼオライト膜を形成して、前記ゼオライト成形体と前記鋳型剤を含有するゼオライト膜を形成して、前記ゼオライト成形体と前記鋳型剤を含有するゼオライト膜との積層体を形成することを特徴とするゼオライト積層中間体の製造方法。
- 23. シリカゾルに、テトラプロピルアンモニウムヒドロキシド(TPAOH)溶液を、テトラプロピルアンモニウムイオン(TPA)と前記シリカゾルとの配合割合(TPA/SiO_2)がモル比で $0.015\sim0.08$ となるように添加し、得られた調製液を混練して乾燥し、得られた乾燥ゲルを湿式粉砕し、得られたスラリーを噴霧、乾燥し、得られた乾燥ゲル造粒物を成形、結晶化処理して、ゼオライト成形体を得、得られた前記ゼオライト成形体を前記調製液と同一又は類似の組成の溶液に浸漬し、水熱合成して、前記ゼオライト成形体上に鋳型剤を含有するゼオライト膜を形成して、前記ゼオライト成形体と前記鋳型剤を含有するゼオライト膜を形成して、前記ゼオライト成形体と前記鋳型剤を含有するゼオライト膜との積層体を形成するとともに、この積層体を仮焼して鋳型剤を同時に除去することを特徴とするゼオライト積層複合体の製造方法。

24. シリカゾルに、テトラプロピルアンモニウムヒドロキシド(TPAOH)溶液を、テトラプロピルアンモニウムイオン(TPA)と前記シリカゾルとの配合割合(TPA/SiO_2)がモル比で $0.015\sim0.08$ となるように添加し、得られた調製液を噴霧して、乾燥し、得られた乾燥ゲルを成形、結晶化処理して、ゼオライト成形体を得、得られた前記ゼオライト成形体を前記調製液と同一又は類似の組成の溶液に浸漬し、水熱合成して、前記ゼオライト成形体上に鋳型剤を含有するゼオライト膜を形成して、前記ゼオライト成形体と前記鋳型剤を含有するゼオライト膜との積層体を形成するとともに、この積層体を仮焼して鋳型剤を同時に除去することを特徴とするゼオライト積層複合体の製造方法。

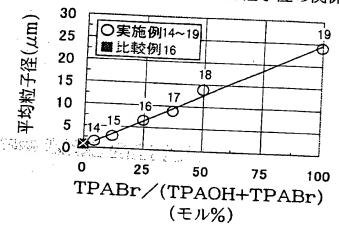
第1図





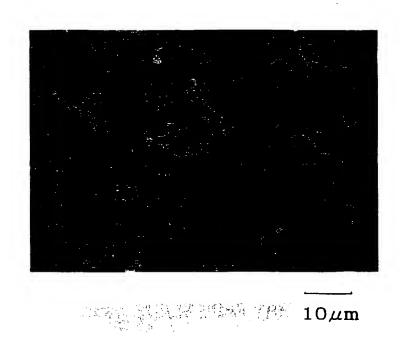
第3図

TPABr配合割合と平均粒子径の関係

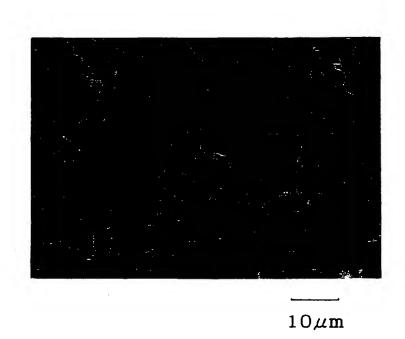


PCT/JP01/01562 4/24

第4図

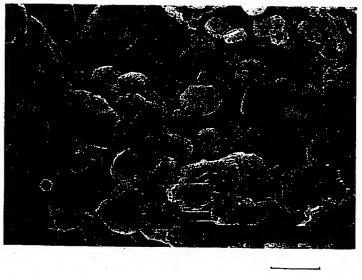


第5図



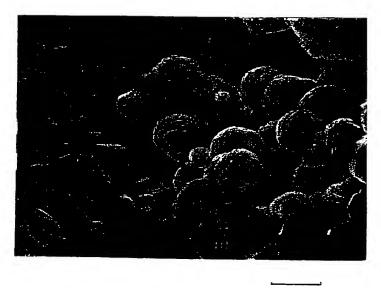
差替え用紙 (規則26)

第6図



 $10\mu m$

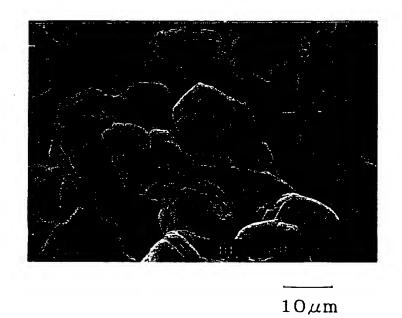
第7図



10µm

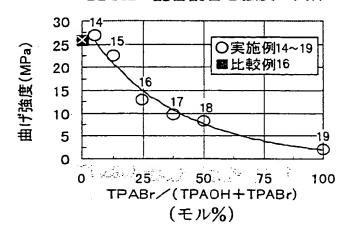
差 替 え 用 紙 (規則26)

第8図



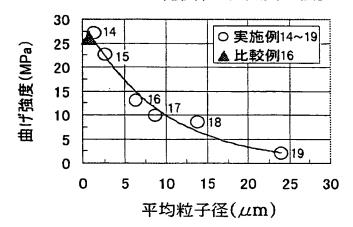
第9図

TPABr配合割合と強度の関係



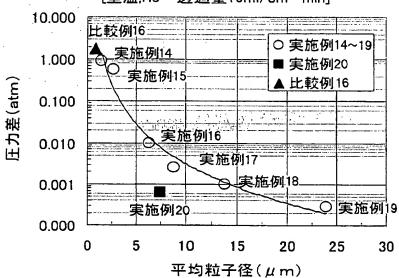
第10図

ゼオライト成形体の四点曲げ強度



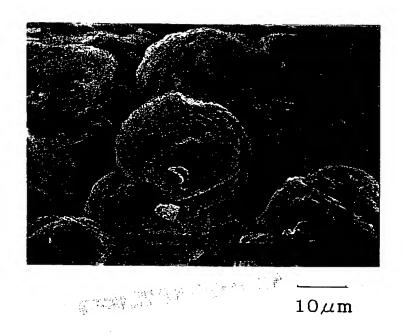
第11図

ゼオライト成形体の圧力損失 [室温,He一透過量10ml/cm²·min]

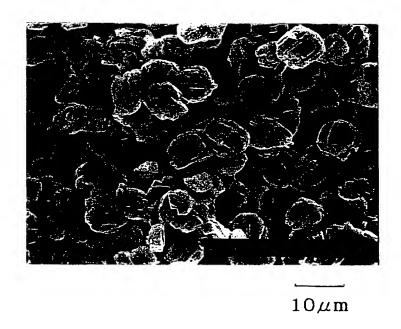


WO 01/64583 PCT/JP01/01562

第12図

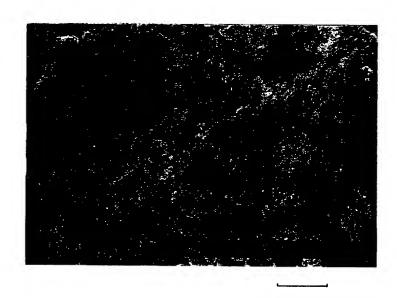


第13図

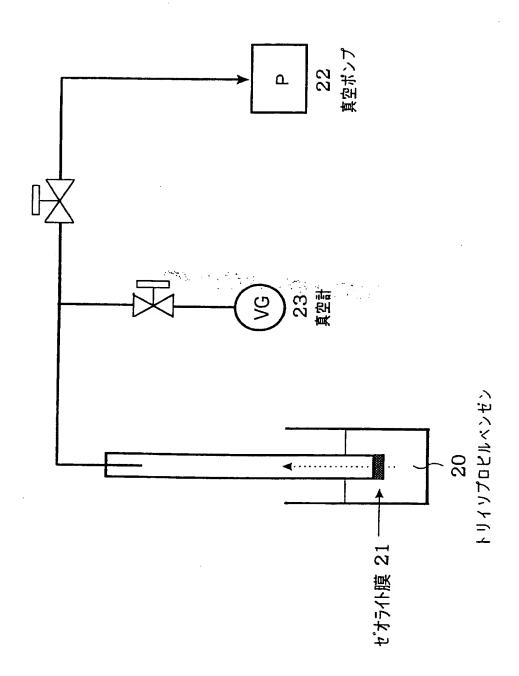


差 智 え 用 紙 (規則26)

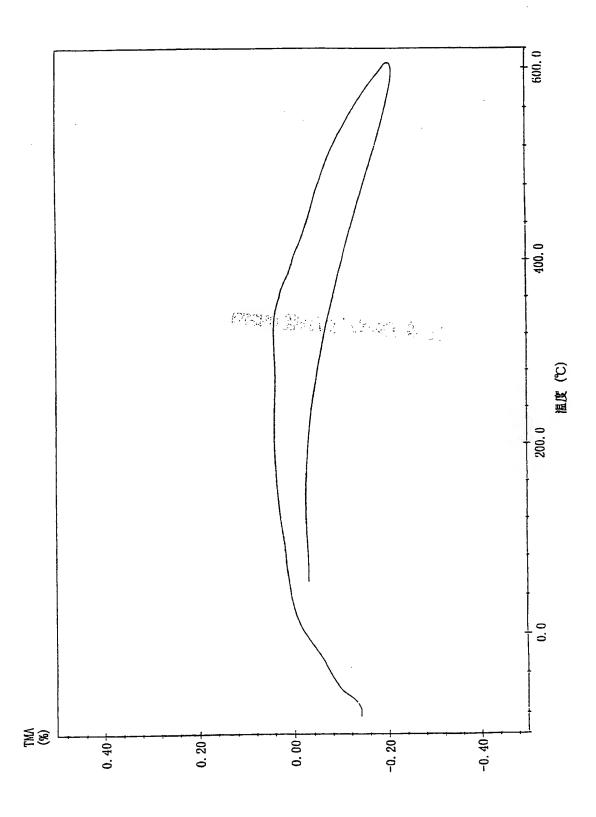
第14図

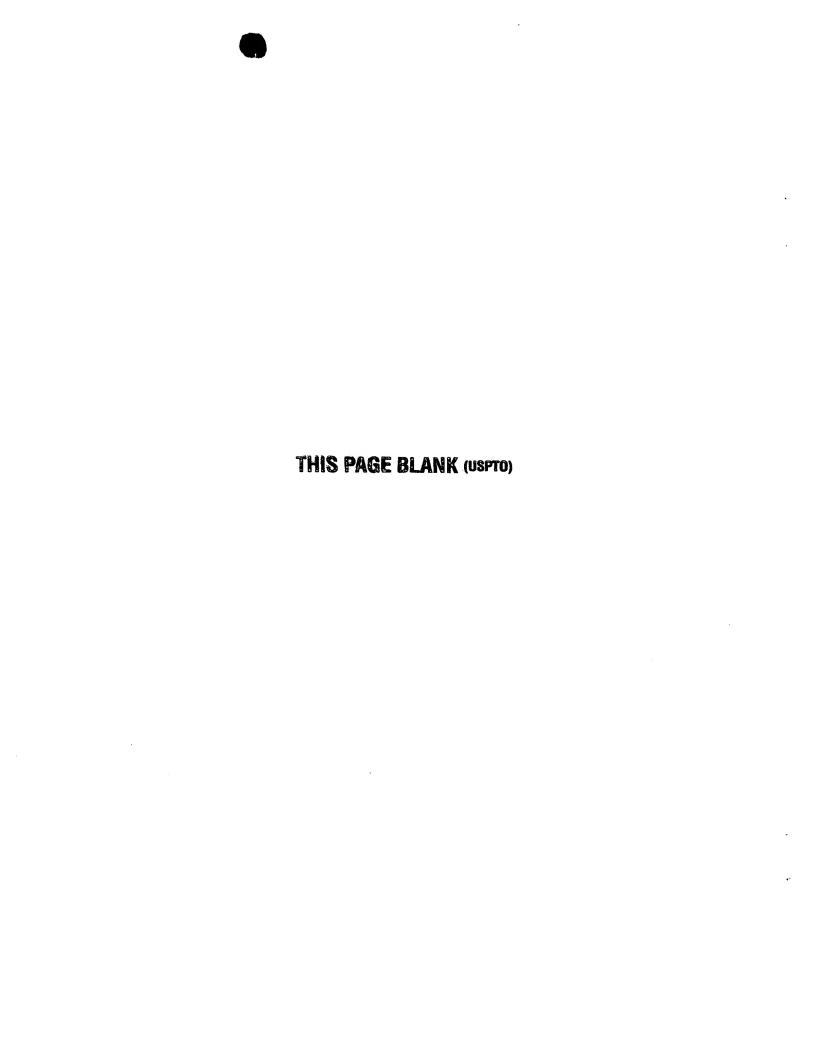


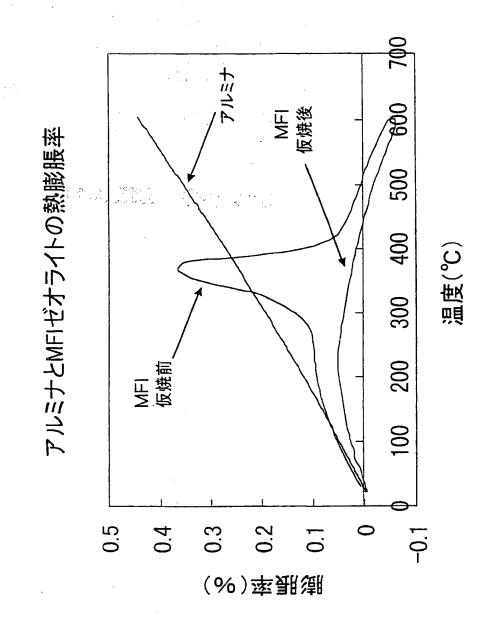
 $10\mu m$



第15図





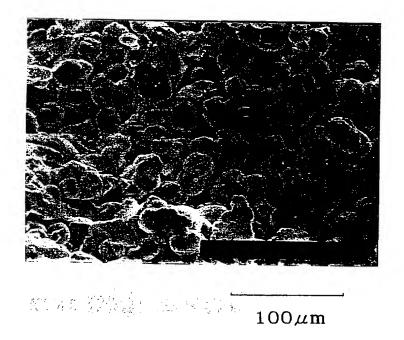


第17図

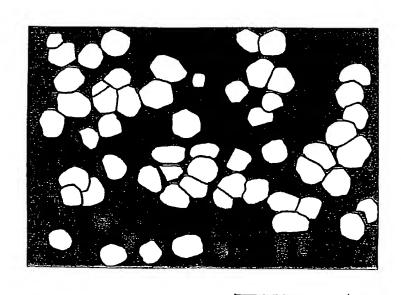


PCT/JP01/01562

第18図

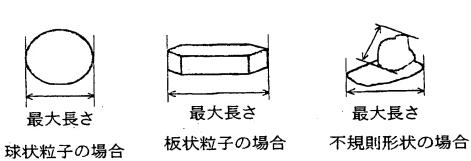


第19図

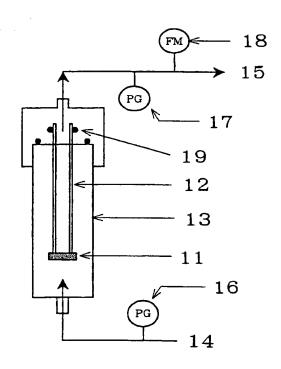


 $100 \mu m$

第20(a)図 第20(b)図 第20(c)図

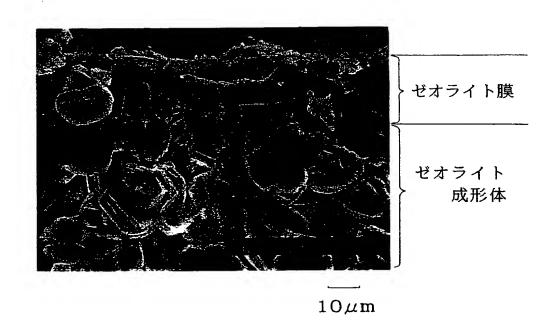


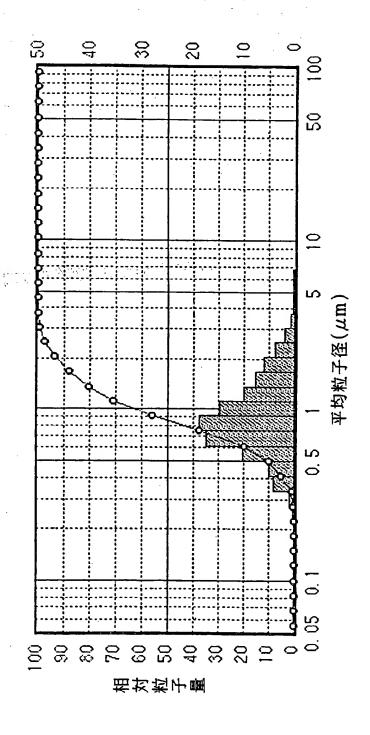
第21図





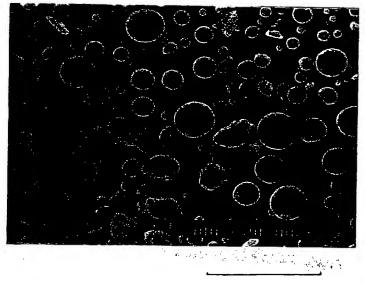
第22図





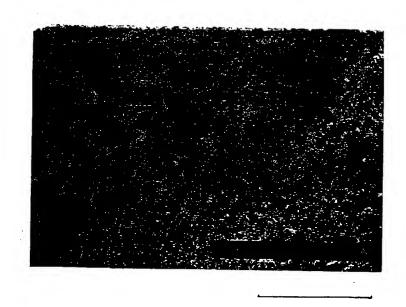
第23図

第24図



 $100 \mu m$

第25図

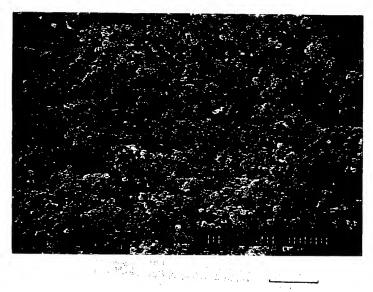


 $100 \mu m$

差 替 え 用 紙 (規則26)

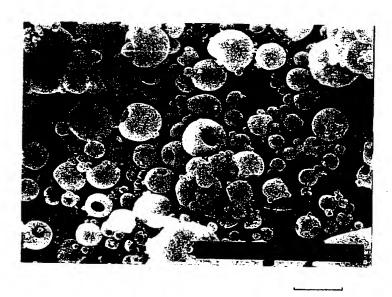


第26図



10µm

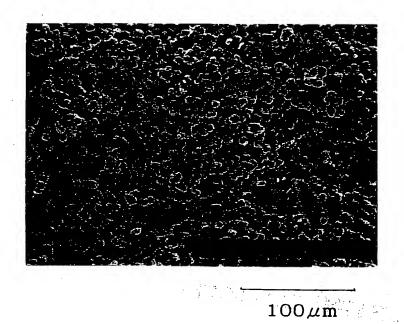
第27図



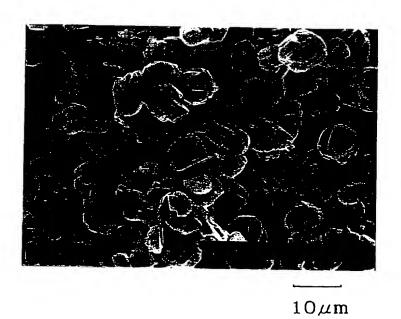
 $10\mu m$



第28図

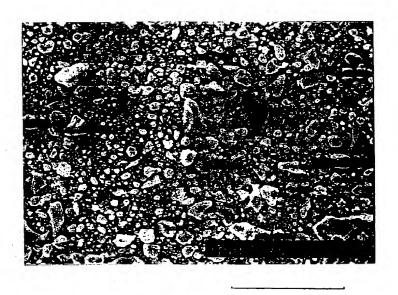


第29図



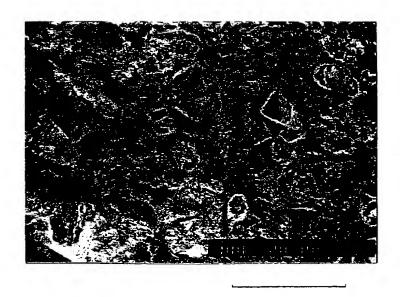
差 替 え 用 紙 (規則26)

第30図



100µm

第31図

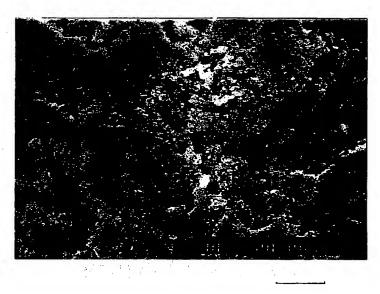


100µm

差替え用紙 (規則26)



第32図

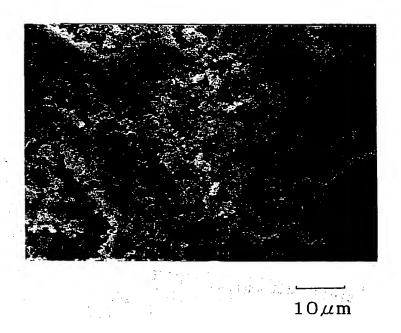


 $10\mu m$

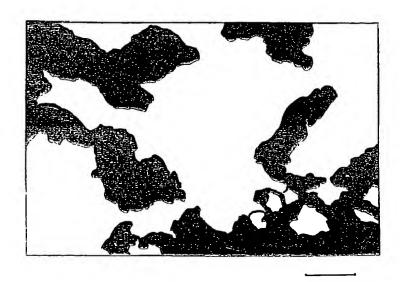
WO 01/64583 PCT/JP01/01562

23/24

第33図



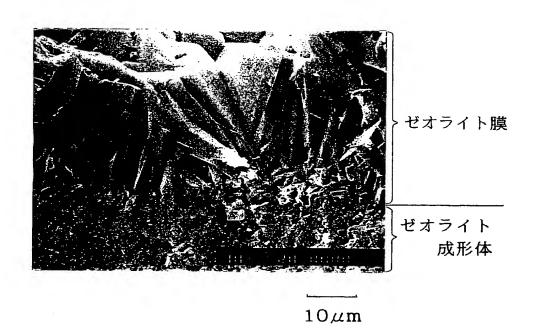
第34図



10µm

差替え用紙 (規則26)

第35図





International application No.

PCT/JP01/01562

A. CLAS: Int	A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER Int.Cl ⁷ ClB39/04				
According t	According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC				
B. FIELD	B. FIELDS SEARCHED				
Minimum d Int	Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) Int.Cl ⁷ C01B39/04-39/54, B01J29/00				
Documentat	ion searched other than minimum documentation to the	a aytant that such documents are included	in the fields secrebed		
Jits	Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched Jitsuyo Shinan Koho 1926-1996 Toroku Jitsuyo Shinan Koho 1994-2001 Kokai Jitsuyo Shinan Koho 1971-2001 Jitsuyo Shinan Toroku Koho 1996-2001				
Electronic d	ata base consulted during the international search (nam	ne of data base and, where practicable, sear	ch terms used)		
C. DOCU	MENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT				
Category*	Citation of document, with indication, where ap	opropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.		
PX	WO, 00/23378, A1 (NGK Insulator	rs, Ltd.),	16-18		
PA	27 April, 2000 (17.04.00), Full text		1-15,19-24		
	& AU, 6006299, B				
x	EP, 152485, Al (Toa Nenryo Kogy	yo Kabushiki Kaisha),	16		
A	28 August, 1985 (28.08.95), Full text		1-15,17-24		
	& JP, 59-162952, A, Full text				
PX	JP, 2000-327327, A (Kubota Corr	poration),	16		
PA	28 November, 2000 (28.11.00), Full text (Family: none)		1-15,17-24		
x	JP, 6-183727, A (Tosoh Corp.),		16		
A	05 July, 1994 (05.07.94),		1-15,17-24		
	Full text (Family: none)		:		
X A	JP, 61-72621, A (Toa Nenryo Kog 14 April, 1986 (14.04.96),	дуо К.К.),	16		
A	Full text (Family: none)		1-15,17-24		
57					
	documents are listed in the continuation of Box C.	See patent family annex.			
"A" docume	categories of cited documents: nt defining the general state of the art which is not	"T" later document published after the inter priority date and not in conflict with the	application but cited to		
"E" earlier o	ed to be of particular relevance locument but published on or after the international filing	"X" understand the principle or theory under document of particular relevance; the c	laimed invention cannot be		
	nt which may throw doubts on priority claim(s) or which is	considered novel or cannot be consider step when the document is taken alone			
special :	establish the publication date of another citation or other reason (as specified) nt referring to an oral disclosure, use, exhibition or other	"Y" document of particular relevance; the considered to involve an inventive step	when the document is		
means	nt published prior to the international filing date but later	combined with one or more other such combination being obvious to a person document member of the same patent fi	skilled in the art		
than the	than the priority date claimed				
Date of the actual completion of the international search 22 May, 2001 (22.05.01)		Date of mailing of the international searce 05 June, 2001 (05.06			
Name and mailing address of the ISA/ A		Authorized officer			
Japanese Patent Office					
Facsimile No.		Telephone No.			

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP01/01562

ategory*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No
X A	EP, 778076, A1 (Institut Français du Pétrole), 11 June, 1997 (11.06.97), Claims 1,3 & JP, 09-173799, A, Claims 1,3 & US, 6140263, A, Claims 1,3	16 1-15,17-24
A	JP, 5-146684, A (Nikko Kyodo Co., Ltd.), 15 June, 1993 (15.06.93), Full text (Family: none)	1-24
:		



International application No.

PCT/JP01/01562

Box I Observations where certain claims were found unsearchable (Continuation of item 1 of first sheet)
This international search report has not been established in respect of certain claims under Article 17(2)(a) for the following reasons:
1. Claims Nos.: because they relate to subject matter not required to be searched by this Authority, namely:
Claims Nos.: because they relate to parts of the international application that do not comply with the prescribed requirements to such an extent that no meaningful international search can be carried out, specifically:
3. Claims Nos.: because they are dependent claims and are not drafted in accordance with the second and third sentences of Rule 6.4(a).
Box II Observations where unity of invention is lacking (Continuation of item 2 of first sheet)
This International Searching Authority found multiple inventions in this international application, as follows:
Inventions described in claims 1 to 6 relate to a zeolite formed product, a zeolite laminate or a method for the preparation thereof which has the purpose of forming a zeolite film on the formed product or the laminate even under hot and moist circumstances without fracture and maintaining the function of the film for a long time without the fracture of the film. Inventions described in claims 7 to 15 relate to a zeolite formed product, a zeolite laminate or a method for the preparation thereof which has the purpose of forming a zeolite film thereon and maintaining it without causing a crack and also of reducing pressure loss and improving mechanical strength in the use as a gas separation membrane or a pervaporation. Inventions described in claims 16 to 24 have the purpose of producing a homogeneous zeolite formed product and thus reducing pressure loss and maintaining and improving mechanical strength. Accordingly, it is clear that the inventions described in all claims have no common problems to be solved and therefore claims 1 to 24 do not comply with the requirement of unity of invention.
1. As all required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report covers all searchable claims.
2. As all searchable claims could be searched without effort justifying an additional fee, this Authority did not invite payment of any additional fee.
3. As only some of the required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report covers only those claims for which fees were paid, specifically claims Nos.:
4. No required additional search fees were timely paid by the applicant. Consequently, this international search report is restricted to the invention first mentioned in the claims; it is covered by claims Nos.:
Remark on Protest The additional search fees were accompanied by the applicant's protest. No protest accompanied the payment of additional search fees.

国際調査報告

国際出願番号 PCT/JP01/01562

A. 発明の属する分野の分類(国際特許分類(IPC))

Int. Cl. ' CO1B39/04

B. 調査を行った分野

調査を行った最小限資料(国際特許分類(IPC))

Int. Cl. ' CO1B39/00-39/54, B01J29/00

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

日本国実用新案公報

1926-1996年

日本国公開実用新案公報

1971-2001年

日本国登録実用新案公報日本国実用新案登録公報

1994-2001年 1996-2001年

国際調査で使用した電子データベース(データベースの名称、調査に使用した用語)

C. 関連すると認められる文献

引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
PX PA	WO,00/23378,A1 (日本碍子株式会社) 27.4月.2000 (27.04.00),全文参照 & AU,6006299,B	16-18 1-15, 19-24
X	EP, 152485, A1(TOA NENRYO KOGYO KABUSHIKI KAISHA)28.8月.1985	16
A	(28.08.85),全文参照 & JP, 59-162952, A,全文参照	1-15, 17-24
PX	JP, 2000-327327, A(株式会社クボタ)28.11月.2000(28.11.0	16
PA	0),全文参照(ファミリーなし)	1-15, 17-24

区欄の続きにも文献が列挙されている。

□ パテントファミリーに関する別紙を参照。

- * 引用文献のカテゴリー
- 「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示す もの
- 「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日 以後に公表されたもの
- 「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行 日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する 文献(理由を付す)
- 「O」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献
- 「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

- の日の後に公表された文献
- 「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって 出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論 の理解のために引用するもの
- 「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明 の新規性又は進歩性がないと考えられるもの
- 「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以 上の文献との、当業者にとって自明である組合せに よって進歩性がないと考えられるもの
- 「&」同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日

22.05.01

国際調査報告の発送日

05.06.01

国際調査機関の名称及びあて先

B本国特許庁 (ISA/JP)

郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号 特許庁審査官(権限のある職員) 髙崎 久子 4G 9830

電話番号 03-3581-1101 内線 3416

国際調查報告

国際出願番号 PCT/JP01/01562

C (統き).	関連すると認められる文献	
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
X A	JP,6-183727, A (東ソー株式会社) 5.7月.1994 (05.07.94) , 全文参照 (ファミリーなし)	16 1-15, 17-24
X A	JP,61-72621, A(東亜燃料工業株式会社)14.4月.1986(14.04.8 6),全文参照(ファミリーなし)	16 1-15, 17-24
X A	EP,778076, Al(Institut Francais du Petrole)11.6月.1997(11.0 6.97),請求項1,請求項3参照 & JP,09-173799,A,請求項1,請 求項3参照 & US,6140263,A,請求項1,請求項3参照	16 1-15, 17-24
A	JP, 5-146684, A (株式会社日鉱共石) 15.6月.1993 (15.06.93), 全文参照 (ファミリーなし)	1-24
	·	

国際調査報告

国際出願番号 PCT/JP01/01562

第1欄 請求の範囲の一部の調査ができないときの意見(第1ページの2の続き)
法第8条第3項(PCT17条(2)(a))の規定により、この国際調査報告は次の理由により請求の範囲の一部について作成しなかった。
1. 請求の範囲は、この国際調査機関が調査をすることを要しない対象に係るものである。 つまり、
2. □ 請求の範囲 は、有意義な国際調査をすることができる程度まで所定の要件を満たしていない国際出願の部分に係るものである。つまり、
3. 請求の範囲 は、従属請求の範囲であってPCT規則6.4(a)の第2文及び第3文の規定に 従って記載されていない。
第Ⅱ欄 発明の単一性が欠如しているときの意見 (第1ページの3の続き)
次に述べるようにこの国際出願に二以上の発明があるとこの国際調査機関は認めた。
請求の範囲1-6に記載の発明は、水熱環境下でも破壊することなくその上にゼオライト膜を形成することができ、その後もゼオライト膜を破壊することなく膜の機能を保持することができる膜を形成することを目的とする、ゼオライト成形体、ゼオライト積層体、又は、それらの製造方法に係るものである。 請求の範囲 7-15に記載の発明は、クラックを発生させることなくその上にゼオライト膜を形成、維持できるとともに、ガス分離膜や、浸透気化膜として用いた場合に、圧力損失の減少及び機械的的強度の向上を目的とするものである。 請求の範囲 16-24に記載の発明は、ゼオライト成形体を均質なものとし、圧力損失の減少及び機械的強度の維持向上を目的とするものである。 従って、請求の範囲全体にわたって解決しようとする課題が同一とは言えず、請求の範囲1-24は単一性の要件を満たしていないことは明らかである。
1. X 出願人が必要な追加調査手数料をすべて期間内に納付したので、この国際調査報告は、すべての調査可能な請求 の範囲について作成した。
2. □ 追加調査手数料を要求するまでもなく、すべての調査可能な請求の範囲について調査することができたので、追 加調査手数料の納付を求めなかった。
3. 出願人が必要な追加調査手数料を一部のみしか期間内に納付しなかったので、この国際調査報告は、手数料の納付のあった次の請求の範囲のみについて作成した。
4. 出願人が必要な追加調査手数料を期間内に納付しなかったので、この国際調査報告は、請求の範囲の最初に記載されている発明に係る次の請求の範囲について作成した。
追加調査手数料の異議の申立てに関する注意